試験計測等料金表

令和４年度

〔 令和５年１月１日 改定 〕

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

海老名本部
海老名市下今泉705-1
046（236）1500（代表）
046（236）1510（技術相談専用）

溝の口支所
川崎市高津区坂戸3-2-1
かながわサイエンスパーク（KSP）内
044-819-2030（支所代表）
044-819-2105（技術相談窓口）

目　　次

海老名本部

1　試験計測料金

（1） 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析

① 観察 …… 1
② 定量分析 …… 2
③ ガスクロマトグラフ成分分析 …… 2
④ 液体クロマトグラフ成分分析 …… 3
⑤ 固体・表面分析 …… 3
⑥ 分光分析・有機物定性分析 …… 4
⑦ 試料調製 …… 4
⑧ 分光光度計 …… 5
⑨ X線構造解析 …… 5
⑩ 熱物性 …… 5
⑪ 粉体・表面性能 …… 6
⑫ 超臨界試験 …… 6

（2） 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価

① 金属・セラミックス・機械部品 …… 7
② 木材 …… 8
③ 糸・繊維 …… 8
④ 塗膜・めっき・表面処理等 …… 9
⑤ プラスチック・ゴム物性試験 …… 9
⑥ 環境試験 …… 10

（3） 機械機器、電気・電子部品等の性能の評価

① 電気・機械機器 …… 12
② デバイス・実装 …… 12
③ 電磁環境・EMC …… 13
④ 温湿度・環境 …… 15
⑤ 音響・振動 …… 16
⑥ デザイン・造形 …… 16
⑦ 寸法測定・形状測定 …… 16
⑧ 非破壊検査 …… 17
⑨ 観察 …… 17
⑩ バッテリー・燃料電池 …… 17

（4） 微生物・生化学・食品

① 微生物・生化学・食品 …… 18

（5） その他 （成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導）
① 成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導 …… 18

2 機器使用料金

（1） 生産・加工機器
① 加工機器 …… 19
② 工作機器 …… 19
③ 熱処理 …… 19
④ 電子・半導体（加工） …… 19
（2） 環境試験・電磁環境試験機器
① 人工気象室 …… 20
② 電磁環境試験機器 …… 20
③ 騒音・振動 …… 20
（3） 試料調製用機器
① 遠心分離機 …… 20
② 熱処理 …… 20
③ 塗装 …… 20
④ バイオ …… 20
（4） 試験・計測機器
① 形状測定 …… 21
② 厚さ・膜厚 …… 21
③ 強度試験機 …… 21
④ 物理特性試験機 …… 21
⑤ 電気計測機器 …… 21
（5） 分析・評価機器（観察）
① 光学顕微鏡 …… 22
② 内部観察機器 …… 22
（6） 分析・評価機器 （ 物性〔光、熱、音振、エネルギー〕）
① 光学機器 …… 22
② 分光分析 …… 22
③ 熱分析 …… 22
④ 反応熱量計 …… 23
（7） その他 （ 製品開発室・ファブラボ ）
① 製品開発室 …… 23
② ファブラボ …… 23

溝の口支所

1　試験計測料金

（1） 材料解析分野

① 機器分析

走査型X線光電子分光分析装置（μ-XPS・μ-ESCA） …… 24

フーリエ変換赤外分光光度計 <FT-IR> …… 24

微小蛍光X線分析装置（XRF） …… 24

金属顕微鏡 …… 24

デジタルマイクロスコープ …… 25

マイクロフォーカスX線検査装置（μF-X線） …… 25

硬さ試験機 …… 25

② 温湿度環境試験 …… 25

③ 電気計測試験 …… 25

（2） 微細構造解析分野

電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM / EDS） …… 26

高分解能分析走査電子顕微鏡（FE-SEM / EDS） …… 26

電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM / EDS） …… 27

分析透過電子顕微鏡（FE-TEM / EDS） …… 28

TEM試料調製 …… 28

集束イオンビーム装置（FIB） …… 29

マルチ解析用集束イオンビーム装置（FIB） …… 30

画像解析システム …… 30

（3） 光機能分野

① 光触媒評価

光触媒JIS試験 …… 31

光触媒性能応用評価試験 …… 31

② 太陽電池評価 …… 31

③ 光学特性評価 …… 32

④ 光劣化促進試験 …… 32

（4） 試料前処理（前項までの試験の各項目に適用） …… 33

（5） 成績書の複本の交付 …… 34

（6） 技術開発受託報告書の作成 …… 34

２　機器使用料金

（1） 生産・加工機器
① 微細加工機器 …… 35
（2） 環境試験・電磁環境試験機器
① 温湿度環境試験 …… 35
② 電磁環境試験機器 …… 35
（3） 試験・計測機器
① 形状測定 …… 36
② 物理特性試験機 …… 36
③ 電気計測機器 …… 36
（4） 分析・評価機器（観察）
① マイクロスコープ …… 37
② 光学顕微鏡 …… 37
③ 電子顕微鏡 …… 37
④ 内部観察機器 …… 37
（5） 分析・評価機器（組成分析）
① 元素分析 …… 37
② 組成分析 …… 37
（6） 分析・評価機器 （ 物性〔光、熱、音振、エネルギー〕）
① 光学機器・分光分析 …… 37
（7） 機器操作指導料 …… 38

〔利用上の注意〕

1　料金は全て消費税を含んでいます。
2　この料金表に掲げる以外に実施可能な項目及び使用可能な設備機器もあります。
　詳細は担当各部へお問い合わせください。
3　機器の更新等により項目及び設備機器名並びに料金の額を変更する場合があります。
4　担当部名欄のE及びKの表示は、同一試験項目の各拠点の該当する料金番号を
　示しています。　Ｅ　海老名本部、Ｋ　溝の口支所

海　老　名　本　部

1　試験計測料金

（1） 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析

① 観察

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0011	走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下	1試料1視野観察につき	20,240	機械・材料技術部 K1310
E0012	走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下　1視野追加	1視野追加観察につき	4,400	機械・材料技術部 K1315
E0013	走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下	1試料1視野観察につき	29,260	機械・材料技術部 K1320
E0014	走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下　1視野追加	1視野追加観察につき	8,910	機械・材料技術部 K1325
E0015	走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの	1試料1視野観察につき	51,920	機械・材料技術部 K1330
E0016	走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの　1視野追加	1視野追加観察につき	14,630	機械・材料技術部 K1335
E0017	走査電子顕微鏡写真撮影　10～15視野		112,860	機械・材料技術部 K1392
E0018	走査電子顕微鏡写真撮影　16～30視野		169,290	機械・材料技術部 K1395
E0021	エネルギー分散型X線分析（EDX） （E0011～E0018、E1790に適用）	1ヶ所につき	7,040	機械・材料技術部
E0022	イオンミリング法による試料調製（1）（標準的なもの）	1試料1ヶ所につき	44,770	機械・材料技術部
E0023	イオンミリング法による試料調製（2）（複雑なもの）	1試料1ヶ所につき	66,880	機械・材料技術部
E1790	電子線後方散乱回折（EBSD)法による結晶方位測定	1視野測定につき	46,750	機械・材料技術部
E1791	電子線後方散乱回折（EBSD)法による結晶方位測定 1視野追加	1視野追加測定につき	11,660	機械・材料技術部
E0031	金属組織写真撮影	写真1枚につき	10,560	機械・材料技術部 K5110
E0070	写真撮影箇所増し　（E0031に適用）	同一試料で1ヶ所増すごとに	2,970	機械・材料技術部 K5114
E0055	実体顕微鏡写真撮影	写真1枚につき	4,840	機械・材料技術部
E0056	実体顕微鏡写真撮影箇所増し　（E0055に適用）	同一試料で1ヶ所増すごとに	2,090	機械・材料技術部
E0080	顕微鏡試料調整（1）　（容易なもの）	1試料につき	1,870	機械・材料技術部 K5120
E0090	顕微鏡試料調整（2）　（標準的なもの）	1試料につき	3,630	機械・材料技術部 K5121
E0091	顕微鏡試料調整（3）　（比較的複雑なもの）	1試料につき	7,260	機械・材料技術部 K5122
E0092	顕微鏡試料調整（4）　（非常に複雑なもの）	1試料につき	10,560	機械・材料技術部 K5123
E0101	デジタルマイクロスコープ観察	1試料につき	2,640	機械・材料技術部
E0102	デジタルマイクロスコープ撮影	1撮影につき	1,100	機械・材料技術部
E2580	表面観察（FE－EPMAによる）	1ヶ所につき	20,020	機械・材料技術部
E2581	エネルギー分散型X線分析（EDX） （FE－EPMAによる）	1ヶ所につき （E2570,E2580に適用）	7,150	機械・材料技術部
E2582	表面観察（FE－EPMAによる）　1ヶ所増	同一試料で1ヶ所増すごとに （E2570,E2580に適用）	4,400	機械・材料技術部
E2590	電子線マイクロアナライザ観測（FE－EPMA） 追加分析	1ヶ所につき （E2570,E2580に適用）	9,130	機械・材料技術部
E4540	マイクロスコープ写真	1試料1ヶ所につき （写真1枚につき）	330	情報・生産技術部

② 定量分析

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1810	定量分析（A）（容易なもの）	1試料，1成分につき（容易なもの）	9,460	化学技術部
E1820	定量分析（B）（複雑なもの）	1試料，1成分につき（複雑なもの）	11,440	化学技術部
E1821	炭素・硫黄分析装置による定量分析（A）（容易なもの）	1試料，1成分につき（容易なもの）	8,360	化学技術部
E1822	炭素・硫黄分析装置による定量分析（B）（複雑なもの）	1試料，1成分につき（複雑なもの）	12,210	化学技術部
E1831	原子吸光分析法による定量分析（A）（容易なもの）	1試料，1成分につき（容易なもの）	8,470	化学技術部
E1832	原子吸光分析法による定量分析（B）（複雑なもの）	1試料，1成分につき（複雑なもの）	12,760	化学技術部
E1891	ICP発光分光分析法による定量分析（A）（容易なもの）	1試料，1成分につき（容易なもの）	8,250	化学技術部
E1892	ICP発光分光分析法による定量分析（B）（複雑なもの）	1試料，1成分につき（複雑なもの）	12,430	化学技術部
E1911	ICP発光分光分析法による定性分析	1試料につき，基本10元素まで	18,920	化学技術部
E1921	ICP発光分光分析法による定性分析 1元素増	1試料につき，1元素増すごとに	1,870	化学技術部
E1930	カールフィッシャー水分測定（直接法）	1条件，1試料につき	11,550	化学技術部
E1931	カールフィッシャー水分測定（直接法） 1試料増	1試料増すごとに	6,930	化学技術部
E1932	カールフィッシャー水分測定（加熱気化法）	1条件，1試料につき	14,630	化学技術部
E1933	カールフィッシャー水分測定（加熱気化法） 1試料増	1試料増すごとに	9,900	化学技術部
E2110	分光蛍光光度計試験	1スペクトルにつき	9,570	化学技術部
E2610	CHN元素分析装置による定量分析	1試料につき	17,490	化学技術部
E4010	水質試験（A）（容易なもの）	1項目につき （容易なもの）	6,380	化学技術部
E4020	水質試験（B）（複雑なもの）	1項目につき （複雑なもの）	10,340	化学技術部
E4030	溶出検液作成（A）（6成分以下）	1試料につき （6成分以下）	4,400	化学技術部
E4040	溶出検液作成（B）（7成分以上）	1試料につき （7成分以上）	8,030	化学技術部

③ ガスクロマトグラフ成分分析

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2225	ガスクロマトグラフによる分析	1試料につき	10,120	化学技術部
E2235	ガスクロマトグラフ定量分析	1試料1成分につき	14,630	化学技術部
E2236	ガスクロマトグラフ定量分析　1成分増	1成分増すごとに	5,830	化学技術部
E2265	ヘッドスペースガスクロマトグラフによる分析	1試料につき	14,960	化学技術部
E2275	ヘッドスペースガスクロマトグラフ定量分析	1試料1成分につき	20,570	化学技術部
E2276	ヘッドスペースガスクロマトグラフ定量分析 1成分増	1成分増すごとに	5,830	化学技術部
E2310	ガスクロマトグラフ質量分析（GCMS）	1試料1成分につき	40,700	化学技術部
E2311	ガスクロマトグラフ質量分析（GCMS） 定性分析　1成分増	1成分増すごとに	5,280	化学技術部
E2312	ガスクロマトグラフ質量分析（GCMS） 定量分析　1成分増	1成分増すごとに	6,160	化学技術部
E2330	ヘッドスペースGCMS分析	1試料1成分につき	52,580	化学技術部
E2331	ヘッドスペースGCMS分析　　定性分析　1成分増	1成分増すごとに	5,280	化学技術部
E2332	ヘッドスペースGCMS分析　　定量分析　1成分増	1成分増すごとに	6,160	化学技術部

（ガスクロマトグラフ成分分析）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2340	サーマルデソープションGCMS分析	1試料1成分につき	56,430	化学技術部
E2341	サーマルデソープションGCMS分析 定性分析　1成分増	1成分増すごとに	5,280	化学技術部
E2342	サーマルデソープションGCMS分析 定量分析　1成分増	1成分増すごとに	6,160	化学技術部
E2350	化学イオン化（CI）法によるGCMS分析	1試料につき （E2310,E2330,E2340に適用）	11,880	化学技術部
E2360	熱分解GCMS分析	1試料1成分につき	55,770	化学技術部
E2361	熱分解GCMS分析　定性分析　1成分増	1成分増すごとに	5,280	化学技術部

④　液体クロマトグラフ成分分析

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2211	イオンクロマトグラフ分析（1）（一般的なもの）	1測定につき	17,050	化学技術部
E2212	イオンクロマトグラフ分析（2）（特殊なもの）	1測定につき	22,000	化学技術部
E2281	高速液体クロマトグラフ分析 （分析条件検討を含まない）	1試料1成分につき	11,220	化学技術部
E2282	高速液体クロマトグラフ分析 （簡単な分析条件を含む）	1試料1成分につき	28,490	化学技術部
E2290	液体クロマトグラフー質量分析　（飛行時間型） （分析条件検討を含まない）	1試料1成分につき	43,450	化学技術部
E2291	液体クロマトグラフー質量分析　（飛行時間型） （簡単な分析条件の検討）	1試料につき　（E2290に適用）	23,100	化学技術部
E2292	液体クロマトグラフー質量分析　（飛行時間型） 定性分析1成分増	1成分増すごとに	4,070	化学技術部
E2294	液体クロマトグラフー質量分析　（四重極型） （分析条件検討を含む）	1試料1成分につき	37,400	化学技術部
E2295	液体クロマトグラフー質量分析　（四重極型） （分析条件検討を含まない）	1試料1成分につき	19,030	化学技術部
E2030	試料調製（5）分取用 液体クロマトグラフ使用	1試料1成分につき	28,820	化学技術部
E2040	試料調製（6）分取用 液体クロマトグラフ使用　1成分増	同試料1成分増すごとに	3,740	化学技術部

⑤　固体・表面分析

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1841	蛍光X線法による微小部定性分析	1試料，1ヶ所につき	9,350	化学技術部
E1842	蛍光X線法による微小部定性分析　1条件増	1条件増すごとに	3,410	化学技術部
E1860	蛍光X線定性分析（波長分散方式）	1試料につき	20,240	化学技術部
E0021	エネルギー分散型X線分析（EDX） （E0011～E0018、E1790に適用）	1ヶ所につき	7,040	機械・材料技術部
E1882	X線光電子分光分析　（簡単なもの）	1試料1ヶ所につき	18,150	機械・材料技術部
E1884	X線光電子分光分析　（簡単なもの）　条件増	1条件増すごとに	8,250	機械・材料技術部
E1980	微小部X線光電子分光分析 （ワイドスキャンのみ）	1試料1ヶ所につき	14,410	機械・材料技術部
E1982	微小部X線光電子分光分析 （ワイドおよびナロースキャン）	1試料1ヶ所につき（6元素まで）	21,450	機械・材料技術部
E1984	微小部X線光電子分光分析（面分析，線分析）	1試料1ヶ所につき（5元素まで）	22,440	機械・材料技術部
E1986	微小部X線光電子分光分析（深さ方向分析）	1試料1ヶ所につき（6元素まで）	33,770	機械・材料技術部
E1990	微小部X線光電子分光分析　条件増	1条件増すごとに	5,280	機械・材料技術部

（固体・表面分析）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1992	微小部X線光電子分光分析　元素増（1）	1元素増すごとに （E1982,E1984に適用）	4,510	機械・材料技術部
E1994	微小部X線光電子分光分析　元素増（2）	1元素増すごとに （E1986に適用）	6,710	機械・材料技術部
E2570	電子線マイクロアナライザ観測（FE－EPMA）	1ヶ所につき	29,370	機械・材料技術部
E2581	エネルギー分散型X線分析（EDX） （FE－EPMAによる）	1ヶ所につき （E2570,E2580に適用）	7,150	機械・材料技術部
E2582	表面観察（FE－EPMAによる）　1ヶ所増	同一試料で1ヶ所増すごとに （E2570,E2580に適用）	4,400	機械・材料技術部
E2590	電子線マイクロアナライザ観測（FE－EPMA） 追加分析	1ヶ所につき （E2570,E2580に適用）	9,130	機械・材料技術部

⑥　分光分析・有機物定性分析

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2021	フーリエ変換赤外分光分析	1スペクトルにつき	19,800	化学技術部 機械・材料技術部 K5055
E2023	フーリエ変換赤外分光分析用微小試料調製	1試料につき	3,190	化学技術部 機械・材料技術部
E2080	顕微レーザーラマン分光分析	1試料1ヶ所につき	58,080	機械・材料技術部
E2090	顕微レーザーラマン分光分析　1条件増	1条件増すごとに	29,920	機械・材料技術部
E2091	顕微レーザーラマン分光分析　（簡単なもの）	1試料1ヶ所につき	20,460	機械・材料技術部
E2631	飛行時間型質量分析	1試料1測定につき	29,700	化学技術部
E2651	電子スピン共鳴分析（A）（基本測定）	1試料1スペクトルにつき	22,110	機械・材料技術部
E2652	電子スピン共鳴分析（B）（特殊測定・定量）	1試料1スペクトルにつき	38,720	機械・材料技術部

⑦　試料調製

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1940	試料調製（1） （切粉作製等簡易な前処理）	E1810,E1820,E1821,E1822,E1831, E1832,E1860,E1932,E1933,E2021, E2211,E2212,E2225,E2235,E2265, E2275,E2281,E2282,E2290,E2294, E2295,E2310,E2330,E2340,E4010, E4020に適用	1,870	化学技術部
E1950	試料調製（2） （難分解性試料等複雑な前処理）	E1810,E1820,E1831,E1832,E1860, E1891,E1892,E1911,E2021,E2211, E2212,E2225,E2235,E2265,E2275, E2281,E2282,E2290,E2294,E2295, E2310,E2330,E2340,E4010,E4020 に適用	9,790	化学技術部
E1960	試料調製（3） （極微量物質の分離濃縮等困難な前処理）	E1810,E1820,E1831,E1832,E1891, E1892,E1911,E2021,E2211,E2212, E2225,E2235,E2265,E2275,E2281, E2282,E2290,E2294,E2295,E2310, E2330,E2340,E4010,E4020に適用	16,280	化学技術部
E1970	試料調製（4） （抽出、濃縮等標準的な前処理）	E1810,E1820,E1831,E1832,E1891, E1892,E1841,E1860,E1911,E2211, E2212,E2225,E2235,E2265,E2275, E2281,E2282,E2290,E2294,E2295, E2310,E2330,E2340,E4010,E4020 に適用	5,170	化学技術部

⑧ 分光光度計

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2011	分光光度計による透過率または拡散反射率測定 （紫外・可視のみ）	1試料1スペクトルにつき	5,830	機械・材料技術部
E2012	分光光度計による透過率または拡散反射率測定 （紫外・可視・近赤外）	1試料1スペクトルにつき	6,380	機械・材料技術部
E2013	分光光度計による正反射率測定 （紫外・可視・近赤外）	偏光子なしまたは偏光1成分の1試料1スペクトルにつき	6,710	機械・材料技術部
E2014	分光光度計による正反射率測定 （紫外・可視・近赤外） 追加（1）	同一試料・同一条件で偏光1成分追加につき	3,740	機械・材料技術部
E2015	分光光度計による正反射率測定 （紫外・可視・近赤外） 追加（2）	同一試料・同一条件・同一偏光成分で1角度追加につき	2,090	機械・材料技術部
E2016	分光光度計による透過率または反射率測定 （特殊なもの）	1試料1スペクトルにつき	9,790	機械・材料技術部
E2017	分光スペクトルによる色彩・色度座標または 太陽光反射率計算	1スペクトル1解析につき	440	機械・材料技術部

⑨ X線構造解析

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2510	X線回折試験（Ⅰ） 粉末X線回折	1試料につき	23,870	電子技術部 化学技術部
E2520	X線回折試験（Ⅱ） 高度な粉末X線回折・薄膜X線回折	1試料につき	36,190	電子技術部 化学技術部
E2530	X線回折試験（Ⅲ） 高度な薄膜X線回折	1試料につき	55,880	電子技術部 化学技術部
E2540	X線回折試験（Ⅳ） 特殊なX線回折	1試料につき （広範囲な逆格子マッピングなど）	85,200	電子技術部 化学技術部

⑩ 熱物性

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2411	示差熱熱重量測定（TG／DTA） 室温～600℃	1測定につき	14,630	化学技術部
E2421	示差熱熱重量測定（TG／DTA） 600℃をこえるもの	1測定につき	20,020	化学技術部
E2432	示差走査熱量測定（DSC）	1測定につき	16,170	化学技術部
E2433	示差走査熱量測定（DSC）液体窒素使用	1測定につき	21,780	化学技術部
E2441	高圧示差熱・熱重量測定	1測定につき	23,210	化学技術部
E2442	発火温度測定（HP-TG法）	1測定につき	20,460	化学技術部
E2450	複合熱分析	1測定につき	69,850	化学技術部
E2460	高圧示差走査熱量測定	1測定につき	22,770	化学技術部
E2470	熱機械測定（TMA）室温～600℃	1測定につき	16,830	化学技術部
E2471	熱機械測定（TMA）600℃をこえるもの	1測定につき	29,040	化学技術部
E2472	熱機械測定（TMA）液体窒素使用	1測定につき	22,550	化学技術部
E2490	試料調製（1） （切断，試験片作製等簡易な前処理）	E2411からE2472に適用	3,300	化学技術部
E2491	試料調製（2） （粉末化等困難な前処理）	E2411からE2472に適用	4,950	化学技術部
E2492	試料調製（3） （溶解，ろ過等複雑な前処理）	E2411からE2472に適用	7,260	化学技術部

⑪ 粉体・表面性能

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E4150	接触角測定試験	1試料につき	2,420	機械・材料技術部
E4160	ゼータ電位測定（A）（微粒子分散溶液）	1試料につき	10,340	機械・材料技術部
E4170	ゼータ電位測定（B）（平板形状試料）	1試料につき	12,870	機械・材料技術部
E4180	粒径分布測定（動的光散乱法）	1試料につき	9,020	機械・材料技術部
E4181	粒径分布測定（光学顕微鏡による画像解析式）	1試料、合成画像1視野につき	4,730	機械・材料技術部
E4182	粒径分布測定（光学顕微鏡による画像解析式） 1視野追加	合成画像1視野追加につき	1,540	機械・材料技術部
E4190	比表面積測定（窒素ガス吸着法）（1） （容易なもの）	1試料につき	21,560	機械・材料技術部
E4191	比表面積測定（窒素ガス吸着法）（2） （複雑なもの）	1試料につき	35,750	機械・材料技術部
E4192	細孔分布解析	1試料につき	3,630	機械・材料技術部

⑫ 超臨界試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E3310	超臨界炭酸ガス抽出	1試料につき	13,860	化学技術部
E3311	超臨界水反応装置試験	1試料につき	40,260	化学技術部
E3312	エントレーナー使用（超臨界炭酸ガス抽出）	1試料、30分間につき （E3310に適用）	4,290	化学技術部
E3313	コールドトラップ使用（超臨界炭酸ガス抽出）	1試料、30分間につき （E3310に適用）	2,200	化学技術部

（2） 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価

① 金属・セラミックス・機械部品

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0110	引張・圧縮・曲げ試験（1）（簡単な試験）	1試料1条件につき	2,530	機械・材料技術部
E0120	引張・圧縮・曲げ試験（2）（比較的簡単な試験）	1試料1条件につき	4,070	機械・材料技術部
E0130	引張・圧縮・曲げ試験（3）（標準的な試験）	1試料1条件につき	5,500	機械・材料技術部
E0140	引張・圧縮・曲げ試験（4）（やや複雑な試験）	1試料1条件につき	7,150	機械・材料技術部
E0150	引張・圧縮・曲げ試験（5）（複雑な試験）	1試料1条件につき	10,560	機械・材料技術部
E0160	大型構造物強度試験（1）（簡単な試験）	1試料1条件につき	8,580	機械・材料技術部
E0165	大型構造物強度試験（2）（標準的な試験）	1試料1条件につき	14,080	機械・材料技術部
E0170	大型構造物強度試験（3）（複雑な試験）	1試料1条件につき	21,670	機械・材料技術部
E0175	常温シャルピー衝撃試験	1試料につき	1,430	機械・材料技術部
E0176	低温シャルピー衝撃試験	1試料につき	3,190	機械・材料技術部
E0180	硬さ試験	1点につき	990	情報・生産技術部 K5330
E0191	薄膜・微小部硬さ試験	1試料1ヶ所につき	21,670	機械・材料技術部
E0192	薄膜・微小部硬さ試験　1ヶ所増	1ヶ所増すごとに	9,680	機械・材料技術部
E0211	トライボ試験	1試料1条件につき	7,700	機械・材料技術部
E0212	トライボ試験　1件増	1条件増すごとに	3,520	機械・材料技術部
E0295	X線応力測定	1試料1方向につき	5,940	機械・材料技術部
E0270	工具寿命試験	1項目につき	16,280	情報・生産技術部
E0310	切削抵抗測定	1項目につき	11,990	情報・生産技術部
E0415	疲労試験　　1時間以内	1試料1条件につき	6,270	機械・材料技術部
E0420	疲労試験　　8時間以内	1試料1条件につき	17,380	機械・材料技術部
E0431	疲労試験　　大型構造物　8時間以内	1試料1条件につき	22,000	機械・材料技術部
E0435	疲労試験　　8時間増　（E0420,E0431に適用）	8時間を超えて8時間増すごとに	7,150	機械・材料技術部
E0440	熱間加工性試験	1試料につき	7,590	機械・材料技術部
E4620	ワイヤ放電加工	1時間当たり	3,960	情報・生産技術部
E0450	NC放電加工試験	1時間当たり	2,420	情報・生産技術部
E0460	ホットプレス処理	1時間当たり	8,360	機械・材料技術部
E0461	制御雰囲気炉処理	1時間当たり	4,510	機械・材料技術部
E0462	脱脂炉処理	1時間当たり	1,650	機械・材料技術部
E0463	卓上型電気炉処理	1時間当たり	1,870	機械・材料技術部
E0470	HIP処理	1時間当たり	18,590	機械・材料技術部
E0471	CIP処理	1時間当たり	6,050	機械・材料技術部
E0480	熱処理特性試験	1時間当たり	12,540	機械・材料技術部
E0761	はんだ継手強度試験	1測定条件につき（10測定点まで）	18,700	電子技術部
E0762	はんだ継手強度試験　5測定点増	5測定点増すごとに	8,360	電子技術部
E3211	金属・合金の電極電位測定（1）	1試料につき4時間まで	14,300	化学技術部
E3212	金属・合金の電極電位測定（2）　1時間増	1時間増すごとに	220	化学技術部
E3221	金属・合金の腐食減量測定（1）	1試料につき24時間まで	13,640	化学技術部
E3222	金属・合金の腐食減量測定（2）　24時間増	24時間増すごとに	3,850	化学技術部
E3223	異種金属接触腐食電流測定（1）	1試料につき4時間まで	14,300	化学技術部
E3224	異種金属接触腐食電流測定（2）　1時間増	1時間増すごとに	220	化学技術部
E3270	金属の分極測定	1試料につき	19,250	化学技術部
E3280	試料調製（1）（比較的容易）	E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270に適用	3,190	化学技術部

（金属・セラミックス・機械部品）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E3290	試料調製（2）（比較的複雑）	E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270に適用	6,490	化学技術部
E3295	電極の研磨	1試料につき	1,540	化学技術部
E3296	腐食液・電解液作製	1試料につき	1,540	化学技術部

② 木材

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E4210	圧縮試験	1試料につき	2,860	情報・生産技術部
E4220	引張試験	1試料につき	3,190	情報・生産技術部
E4240	曲げ試験（50kN以下）	1試料につき	2,530	情報・生産技術部
E4241	曲げ試験（50kN以下） （曲げ強さ及び曲げヤング係数の算出を必要とするもの）	1試料につき	3,740	情報・生産技術部
E4250	摩耗試験	1試料につき	4,290	情報・生産技術部
E4260	局所構造試験	1試料1測定につき	2,970	情報・生産技術部
E4270	密度測定	1試料につき	1,540	情報・生産技術部
E4280	含水率測定	1試料につき	6,050	情報・生産技術部
E4281	含水率測定　1増	一緒の工程で1試料増すごとに	2,420	情報・生産技術部
E4310	いす繰返し衝撃試験（1）	1試料1条件につき（4,000回まで）	8,910	情報・生産技術部
E4320	いす繰返し衝撃試験（2）　4,000回増	同一試料に連続し4,000回増すごとに	5,170	情報・生産技術部
E4350	いす繰返し耐久性試験（1）	1試料1条件につき（5,000回まで）	9,900	情報・生産技術部
E4360	いす繰返し耐久性試験（2）　5,000回増	同一試料に連続し5,000回増すごとに	5,170	情報・生産技術部
E4370	垂直過重下の強度試験	1試料1条件につき	3,740	情報・生産技術部
E4380	背もたれの静的強度試験	1試料1条件につき	3,740	情報・生産技術部
E4390	脚部の静的強度試験	1試料1条件につき	3,740	情報・生産技術部
E4480	煮沸繰返し試験	1試料につき	2,640	情報・生産技術部
E4490	温冷水浸せき試験	1試料につき	1,650	情報・生産技術部
E4510	試料調整（1）（鋸盤鉋盤などによる試験片作製）	1試料につき	1,650	情報・生産技術部
E4520	試料調整（2）（接着調湿等の前処理を伴うもの）	1試料につき	2,420	情報・生産技術部

③ 糸・繊維

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E3520	耐光試験（カーボンアーク）	1試料につき20時間	1,540	化学技術部
E3450	繊維熱物性試験	1試料1測定につき	5,390	化学技術部
E3460	重量測定	1試料につき	550	化学技術部
E3620	編織物厚さ測定	1試料につき	2,200	化学技術部
E3650	編織物通気度試験	1試料につき	2,750	化学技術部
E3661	編織物強伸度測定	1試料1方向につき	3,080	化学技術部
E3710	剛軟度試験	1試料1方向につき	1,210	化学技術部
E3730	はっ水度試験	1試料につき	2,640	化学技術部
E3820	糸強伸度測定（容易なもの）	1試料につき	1,100	化学技術部
E3771	サーモグラフィによる表面温度測定	1時間につき	8,470	化学技術部
E3772	サーモグラフィによる表面温度測定 （特殊条件の場合）	1時間につき	16,750	化学技術部
E3930	赤外線放射計による放射率測定	1試料1測定につき	41,910	化学技術部

④ 塗膜・めっき・表面処理等

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E3010	塗膜物性試験	1試料につき	1,760	化学技術部
E3030	光沢度測定	1試料につき	3,300	化学技術部
E3040	色彩測定	1試料につき	3,300	化学技術部
E3050	浸せき試験	室温で実施の場合 1試料24時間まで	4,510	化学技術部
E3051	浸せき試験　24時間増	24時間増すごとに	660	化学技術部
E3052	浸せき試験用試薬調製	1試料につき	3,410	化学技術部
E3060	塩水噴霧試験	1試料24時間につき	2,200	化学技術部
E3071	煮沸試験	1試料8時間につき	3,520	化学技術部
E3080	耐熱性試験	1試料500℃まで8時間につき	2,090	化学技術部
E3090	外観撮影	1枚につき	440	化学技術部
E3095	外観撮影（色彩調整を要するもの）	1枚につき	2,310	化学技術部

⑤ プラスチック・ゴム物性試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1397	促進耐候性試験（キセノン）	標準条件(放射照度60W/㎡、BPT63℃、スプレー18分/120分)の場合　1試料50時間につき	20,240	化学技術部
E1398	試料取付費	1ホルダーにつき （E1397に適用）	3,190	化学技術部
E1399	試料抜取り費	1ホルダーにつき （E1397に適用）	1,540	化学技術部
E2720	比重試験（水中置換法）（室温）	1試料につき	7,920	化学技術部
E2730	吸水試験 （室温）	1試料につき	7,040	化学技術部
E2750	動的粘弾性測定レオメーター （1走査1時間未満、冷凍機を使用しない場合）	1走査（温度変化または振動数変化）につき	18,040	化学技術部
E2751	動的粘弾性測定DMA （1走査1時間未満、冷凍機を使用しない場合）	1走査（温度変化または振動数変化）につき	16,390	化学技術部
E2760	動的粘弾性測定レオメーター （1走査2時間未満または冷凍機使用）	1走査（温度変化または振動数変化）につき	29,040	化学技術部
E2761	動的粘弾性測定DMA （1走査2時間未満または冷凍機使用）	1走査（温度変化または振動数変化）につき	27,610	化学技術部
E2770	動的粘弾性測定レオメーター （1走査3時間未満または液体窒素使用）	1走査（温度変化または振動数変化）につき	41,140	化学技術部
E2771	ペルチェシステム使用（10～150℃）	E2750,E2760に適用	6,490	化学技術部
E2772	試料調整（取り付け困難なもの）	E2750,E2751,E2760,E2761,E2770に適用	2,750	化学技術部
E2773	測定前温度調整	1試料につき1時間毎 (E2750,E2751,E2760,E2761,E2770に適用)	3,190	化学技術部
E2841	引張試験（50kN以下）	1試験片につき	3,190	化学技術部
E2842	圧縮試験（50kN以下）	1試験片につき	3,190	化学技術部
E2843	曲げ試験（5kN以下）	1試験片につき	3,190	化学技術部
E2844	動作パターン制御試験	1試験片につき	9,900	化学技術部
E2851	引張弾性率測定（接触式伸び計使用）（室温）	1試験片につき	5,390	化学技術部
E2852	圧縮弾性率測定（室温）	1試験片につき	3,190	化学技術部
E2853	曲げ弾性率測定（室温）	1試験片につき	3,190	化学技術部
E2861	接着強さ試験	1試験片につき	4,180	化学技術部
E2862	はく離接着強さ試験（室温）	1試験片につき	4,620	化学技術部
E2863	軟質発泡材料圧縮試験（室温）	1試験片につき	9,900	化学技術部

（プラスチック・ゴム物性試験）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E2871	非接触式伸び計使用	1試験片につき（E2841に適用）	3,080	化学技術部
E2872	恒温槽使用（-30～200℃）	1試験片につき（E2841,E2842,E2843,E2844,E2861に適用）	2,860	化学技術部
E2873	恒温恒湿槽使用	1試験片につき（E2841,E2842,E2843,E2844,E2861に適用）	3,960	化学技術部
E2880	衝撃試験（アイゾット・シャルピー）（室温）	1試料につき	6,380	化学技術部
E2885	ノッチ加工	1試験片につき（E2880に適用）	1,980	化学技術部
E2920	硬さ試験（ロックウェル・デュロメータ）（室温）	1試料につき	3,410	化学技術部
E2930	熱伝導率測定（プローブ法）（室温）	1試料につき	10,010	化学技術部
E2940	プラスチック製品の破断面観察	1試料につき	29,150	化学技術部
E2941	プラスチック製品の破断面写真撮影	写真1枚につき（E2940に適用）	2,970	化学技術部
E2942	プラスチック製品の破断面写真撮影（倍率変更）	写真1枚につき（E2941に適用）	1,430	化学技術部
E2943	プラスチック製品の外観撮影	写真1枚につき（E2940に適用）	1,430	化学技術部
E2944	観察試料作製（1）（標準的なもの）	1試料につき（E2940に適用）	3,630	化学技術部
E2945	観察試料作製（2）（複雑なもの）	1試料につき（E2940に適用）	7,260	化学技術部

⑥　環境試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1230	恒温恒湿槽（中）	24時間まで	19,580	電子技術部 K5410
E1240	恒温恒湿槽（中）　24時間増	24時間増すごとに	7,590	電子技術部 K5411
E1270	恒温恒湿槽（中）サイクル	24時間まで	25,300	電子技術部 K5415
E1280	恒温恒湿槽（中）サイクル　24時間増	24時間増すごとに	8,690	電子技術部 K5416
E1290	高温槽	24時間まで	12,100	電子技術部
E1310	高温槽　24時間増	24時間増すごとに	5,940	電子技術部
E1320	プレッシャークッカー試験	24時間まで	19,140	電子技術部 K5440
E1330	プレッシャークッカー試験　24時間増	24時間増すごとに	11,990	電子技術部 K5441
E1350	冷熱衝撃試験（中）	8時間まで	10,560	電子技術部
E1360	冷熱衝撃試験（中）　8時間増	8時間増すごとに	5,280	電子技術部
E1361	ハイパワー恒温恒湿槽（ARSF）	24時間まで	25,610	電子技術部
E1362	ハイパワー恒温恒湿槽（ARSF）24時間増	24時間増すごとに	14,300	電子技術部
E1363	冷熱衝撃試験（中・TSA）	8時間まで	12,430	電子技術部
E1364	冷熱衝撃試験（中・TSA）　8時間増	8時間増すごとに	6,050	電子技術部
E1365	HAST試験	24時間まで	19,800	電子技術部
E1366	HAST試験　24時間増	24時間増すごとに	13,200	電子技術部
E1370	恒温恒湿槽（大、150℃対応）	24時間まで	31,350	電子技術部
E1375	恒温恒湿槽（大、150℃対応）　24時間増	24時間増すごとに	16,500	電子技術部
E1376	恒温恒湿槽（低湿度対応）	24時間まで	25,610	電子技術部
E1377	恒温恒湿槽（低湿度対応）24時間増	24時間増すごとに	11,440	電子技術部

（環境試験）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1380	冷熱衝撃試験（大）	8時間まで	13,860	電子技術部
E1385	冷熱衝撃試験（大）　8時間増	8時間増すごとに	6,930	電子技術部
E1390	小型恒温恒湿槽（SH）	24時間まで	16,940	電子技術部
E1391	小型恒温恒湿槽（SH）　24時間増	24時間増すごとに	6,820	電子技術部
E1392	小型恒温槽（温度のみ）	24時間まで	13,640	電子技術部
E1393	小型恒温槽（温度のみ）　24時間増	24時間増すごとに	5,280	電子技術部
E1386	パワーサイクル試験	8時間まで	22,000	電子技術部
E1387	パワーサイクル試験　8時間増	8時間増すごとに	10,340	電子技術部
E1394	人工気象室（小型）	1時間ごとに	5,280	化学技術部
E1395	人工気象室（大型）	1時間ごとに	7,810	化学技術部
E1396	日射装置	1時間ごとに（人工気象室（大型）の料金に加算）	6,490	化学技術部
E1397	促進耐候性試験（キセノン）	標準条件(放射照度60W/㎡、BPT63℃、スプレー18分/120分)の場合　1試料50時間につき	20,240	化学技術部
E1398	試料取付費	1ホルダーにつき　（E1397に適用）	3,190	化学技術部
E1399	試料抜取り費	1ホルダーにつき　（E1397に適用）	1,540	化学技術部
E3520	耐光試験（カーボンアーク）	1試料につき20時間	1,540	化学技術部

（3） 機械機器、電気・電子部品等の性能の評価

① 電気・機械機器

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0510	電流電圧測定（1mA以上，1mV以上）	1試料1条件につき	3,190	電子技術部
E0570	電気抵抗測定	1試料1条件につき	3,960	電子技術部
E0591	四探針法による抵抗率測定	1試料1測定につき	10,230	電子技術部
E0660	電気機器・漏れ電流測定	1条件1測定につき	4,730	電子技術部
E0670	電気機器・耐電圧試験	1試料1測定につき	4,070	電子技術部
E0680	電気機器・接地回路の抵抗測定	1条件1測定につき	4,950	電子技術部
E0690	LCR測定	1試料1条件につき	9,350	電子技術部
E0710	LCR測定　1ヶ所増	1試料につき測定点1ヶ所増すごとに	3,080	電子技術部
E0750	絶縁抵抗試験	1条件1測定につき	4,950	電子技術部
E0760	電気機器・温度試験	1測定点につき	2,970	電子技術部
E0813	電源変動および瞬停試験	2時間まで	11,990	電子技術部
E0814	電源変動および瞬停試験　1時間増	1時間増すごとに	5,940	電子技術部
E0820	電気機器・電力測定	1試料1条件につき	5,280	電子技術部
E0890	イーサネットコンプライアンステスト	1時間につき	4,730	情報・生産技術部
E0910	磁化特性測定（VSM方式）	1試料1測定につき	6,600	電子技術部
E0920	磁化特性測定（積分方式）	1試料1測定につき	4,620	電子技術部
E0930	磁歪測定	1試料1測定につき	18,590	電子技術部
E0931	磁歪測定　1条件増	1条件増すごとに	12,100	電子技術部
E0940	磁化温度特性測定	1試料1測定につき	20,130	電子技術部
E0950	薄膜交流透磁率測定	1試料1測定につき	5,500	電子技術部
E0951	交流磁化特性測定 （B-H曲線、鉄損、透磁率、インダクタンス）	1試料1測定につき	10,010	電子技術部
E0952	交流磁化特性測定 （B-H曲線、鉄損、透磁率、インダクタンス）　1条件増	1条件増すごとに	6,710	電子技術部
E0953	交流磁化特性測定 （B-H曲線無しの連続測定、可変条件は1）	1試料5測定まで	16,720	電子技術部
E0954	交流磁化特性測定 （B-H曲線無しの連続測定、可変条件は1）　1測定増	1測定増すごとに	2,530	電子技術部
E0958	試料調整	1時間当たり	3,190	電子技術部
E0959	データ処理	1時間当たり	3,190	電子技術部
E4820	適合性試験（FL-net）	1試料6時間まで	51,260	情報・生産技術部
E4821	相互接続性試験（FL-net）	1試料2時間まで	34,210	情報・生産技術部
E4910	ノイズ試験（CC-Link）	1試料8時間まで	31,570	情報・生産技術部
E4920	ハードウェア試験（CC-Link）	1試料4時間まで	15,730	情報・生産技術部
E4930	ソフトウェア試験（CC-Link）	1試料10時間まで	39,380	情報・生産技術部
E4940	組み合わせ試験（CC-Link）	1試料6時間まで	23,650	情報・生産技術部
E4950	インタオペラビリティ試験（CC-Link）	1試料5時間まで	19,690	情報・生産技術部
E4960	エージング試験（CC-Link）	1試料12時間まで	14,080	情報・生産技術部

② デバイス・実装

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1030	薄膜屈折率測定	1試料につき	23,760	電子技術部
E1040	定エネルギー分光測定	1条件につき	35,970	電子技術部
E1050	膜厚測定	1試料1測定点につき	5,720	電子技術部
E1060	フォトルミネッセンス測定	1試料1条件につき	42,130	電子技術部
E1070	高分解能（1nm以下）フォトルミネッセンス測定	1試料1条件につき	83,160	電子技術部

（デバイス・実装）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1080	低温光特性評価	1試料1条件につき	34,980	電子技術部
E1090	位相差測定	1試料1条件につき	11,330	電子技術部
E1120	酸化拡散試験	1時間当たり	24,750	電子技術部
E1130	光干渉式膜厚測定	1試料1測定点につき	3,190	電子技術部
E1140	光干渉式膜厚測定　1測定点増	1試料につき1測定点増すごとに	1,540	電子技術部
E1152	ホール効果測定	1試料1条件につき	20,680	電子技術部
E0767	熱抵抗測定	1時間当たり	9,350	電子技術部
E1153	超音波ウェッジボンダ試験	1時間当たり	8,800	電子技術部
E1154	超音波ボールボンダ試験	1時間当たり	10,450	電子技術部
E0763	ワイヤーボンディング強度試験	1測定条件につき（10測定点まで）	21,560	電子技術部
E0764	ワイヤーボンディング強度試験　5測定点増	5測定点増すごとに	9,900	電子技術部
E0765	ダイシェア試験	1測定条件につき（10測定点まで）	23,100	電子技術部
E0766	ダイシェア試験　5測定点増	5測定点増すごとに	10,670	電子技術部
E1155	ダイシング加工（半導体基板精密加工）	1時間当たり	16,830	電子技術部
E1156	真空蒸着	標準1試料当たり	37,510	電子技術部
E1157	真空蒸着　1条件増	1条件増すごとに	18,150	電子技術部
E1158	スパッタ成膜	標準1試料当たり	48,730	電子技術部
E1160	イオンプレーティング成膜	標準1試料当たり	50,160	電子技術部
E1170	イオンプレーティング成膜　1条件増	1条件増すごとに	19,250	電子技術部
E1180	アッシャーによるプラズマ処理	1条件1時間につき	17,820	電子技術部
E1190	ECRプラズマエッチング	標準1試料当たり	48,070	電子技術部
E1191	高精度フォトリソグラフィ	1枚につき	25,300	電子技術部
E1192	高精度フォトリソグラフィ　1枚増	1枚増すごとに	9,020	電子技術部
E1200	電子線リソグラフィ	1時間当たり	10,120	電子技術部
E1201	電子線リソグラフィ試料調製	1試料につき	9,350	電子技術部
E1211	クリーン雰囲気試験	1時間当たり	6,270	電子技術部
E0768	パワー半導体静特性試験	1時間当たり	7,040	電子技術部
E0769	半導体パラメータ測定	1時間当たり	7,040	電子技術部

③　電磁環境・EMC

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0770	マイクロ波スペクトラムアナライザ測定	1条件1測定につき	8,800	電子技術部
E0771	マイクロ波スペクトラムアナライザ測定　1件増	1測定増すごとに	3,740	電子技術部
E0780	ネットワークアナライザ測定（マルチポート）	1測定につき	10,450	電子技術部
E0791	ネットワークアナライザ測定（4ポートまで）	1試料1条件につき	7,590	電子技術部
E0792	ネットワークアナライザ測定（4ポートまで）　1件増	1条件増すごとに	2,860	電子技術部
E0835	マイクロ・ミリ波伝送特性測定 （Sパラメータ・TDR測定）	1条件1測定につき	18,150	電子技術部
E0836	マイクロ・ミリ波伝送特性測定 （Sパラメータ・TDR測定）　1件増	1測定増すごとに	4,730	電子技術部
E0845	マイクロ・ミリ波伝送特性測定 （プローバー測定）	1条件1測定につき	31,680	電子技術部
E0846	マイクロ・ミリ波伝送特性測定 （プローバー測定）　1件増	1測定増すごとに	5,060	電子技術部
E0850	マイクロ波誘電率測定 （共振器法・誘電体プローブ法）	1条件1測定につき	17,380	電子技術部
E0860	マイクロ波誘電率測定 （共振器法・誘電体プローブ法）　1件増	1測定増すごとに	5,830	電子技術部

（電磁環境・EMC）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0870	マイクロ波誘電率・透磁率測定 （Sパラメータ法）	1条件1測定につき	16,060	電子技術部
E0880	マイクロ波誘電率・透磁率測定 （Sパラメータ法）　1件増	1測定増すごとに	4,510	電子技術部
E0881	マイクロ波誘電率・透磁率測定 （ハーモニック共振器法）	1測定につき	18,370	電子技術部
E0882	マイクロ波誘電率測定　（BCDR法）	1条件1測定につき	39,160	電子技術部
E1410	放射妨害波測定	2時間まで	38,500	電子技術部
E1420	放射妨害波測定　1時間増	1時間増すごとに	14,740	電子技術部
E1425	車載機器の放射・伝導妨害波測定	2時間まで	38,500	電子技術部
E1426	車載機器の放射・伝導妨害波測定　1時間増	1時間増すごとに	14,740	電子技術部
E1430	電源・通信ポート伝導妨害波測定	1時間まで	23,650	電子技術部
E1440	電源・通信ポート伝導妨害波測定　1時間増	1時間増すごとに	14,740	電子技術部
E1450	雑音電力測定	1時間まで	23,760	電子技術部
E1460	雑音電力測定　1時間増	1時間増すごとに	14,740	電子技術部
E1472	放射無線周波電磁界イミュニティ試験	2時間まで	33,330	電子技術部
E1482	放射無線周波電磁界イミュニティ試験　1時間増	1時間増すごとに	13,310	電子技術部
E1490	静電気放電イミュニティ試験	1時間まで	12,210	電子技術部
E1510	静電気放電イミュニティ試験　1時間増	1時間増すごとに	7,040	電子技術部
E1520	電気的ファーストトランジェント/ バーストイミュニティ試験	1時間まで	12,210	電子技術部
E1530	電気的ファーストトランジェント/ バーストイミュニティ試験　1時間増	1時間増すごとに	7,040	電子技術部
E1540	雷サージイミュニティ試験	1時間まで	12,210	電子技術部
E1550	雷サージイミュニティ試験　1時間増	1時間増すごとに	7,040	電子技術部
E1553	誘導伝導電磁界イミュニティ試験	1時間まで	19,470	電子技術部
E1554	誘導伝導電磁界イミュニティ試験　1時間増	1時間増すごとに	12,980	電子技術部
E1560	インパルスノイズ試験	1時間まで	12,210	電子技術部
E1570	インパルスノイズ試験　1時間増	1時間増すごとに	7,040	電子技術部
E1581	電磁波シールド効果測定 （100kHz～1GHz、KEC法）	1試料1測定（電界または磁界）につき	6,380	電子技術部
E1600	マイクロ波電磁波シールド効果測定 （1GHz～8.5GHz、2焦点型扁平空洞）	1試料1測定につき	7,260	電子技術部
E1605	電波透過特性測定（マイクロ波帯）	1条件1測定につき	15,290	電子技術部
E1606	電波透過特性測定（マイクロ波帯）　1件増	1測定増すごとに	7,150	電子技術部
E1610	電波吸収率測定（簡易アンテナ法）	1条件1測定につき	13,090	電子技術部
E1620	電波吸収率測定（簡易アンテナ法）　1件増	1測定増すごとに	3,630	電子技術部
E1630	アンテナ指向性測定	2時間まで	40,260	電子技術部
E1640	アンテナ指向性測定　1時間増	1時間増すごとに	15,730	電子技術部
E1650	三次元アンテナ指向性測定	2時間まで	45,210	電子技術部
E1660	三次元アンテナ指向性測定　1時間増	1時間増すごとに	20,790	電子技術部

④ 温湿度・環境

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1230	恒温恒湿槽（中）	24時間まで	19,580	電子技術部 K5410
E1240	恒温恒湿槽（中） 24時間増	24時間増すごとに	7,590	電子技術部 K5411
E1270	恒温恒湿槽（中）サイクル	24時間まで	25,300	電子技術部 K5415
E1280	恒温恒湿槽（中）サイクル 24時間増	24時間増すごとに	8,690	電子技術部 K5416
E1290	高温槽	24時間まで	12,100	電子技術部
E1310	高温槽 24時間増	24時間増すごとに	5,940	電子技術部
E1320	プレッシャークッカー試験	24時間まで	19,140	電子技術部 K5440
E1330	プレッシャークッカー試験 24時間増	24時間増すごとに	11,990	電子技術部 K5441
E1350	冷熱衝撃試験（中）	8時間まで	10,560	電子技術部
E1360	冷熱衝撃試験（中） 8時間増	8時間増すごとに	5,280	電子技術部
E1361	ハイパワー恒温恒湿槽（ARSF）	24時間まで	25,610	電子技術部
E1362	ハイパワー恒温恒湿槽（ARSF） 24時間増	24時間増すごとに	14,300	電子技術部
E1363	冷熱衝撃試験（中・TSA）	8時間まで	12,430	電子技術部
E1364	冷熱衝撃試験（中・TSA） 8時間増	8時間増すごとに	6,050	電子技術部
E1365	HAST試験	24時間まで	19,800	電子技術部
E1366	HAST試験 24時間増	24時間増すごとに	13,200	電子技術部
E1370	恒温恒湿槽（大、150℃対応）	24時間まで	31,350	電子技術部
E1375	恒温恒湿槽（大、150℃対応） 24時間増	24時間増すごとに	16,500	電子技術部
E1376	恒温恒湿槽（低湿度対応）	24時間まで	25,610	電子技術部
E1377	恒温恒湿槽（低湿度対応） 24時間増	24時間増すごとに	11,440	電子技術部
E1380	冷熱衝撃試験（大）	8時間まで	13,860	電子技術部
E1385	冷熱衝撃試験（大） 8時間増	8時間増すごとに	6,930	電子技術部
E1390	小型恒温恒湿槽（SH）	24時間まで	16,940	電子技術部
E1391	小型恒温恒湿槽（SH） 24時間増	24時間増すごとに	6,820	電子技術部
E1392	小型恒温槽（温度のみ）	24時間まで	13,640	電子技術部
E1393	小型恒温槽（温度のみ） 24時間増	24時間増すごとに	5,280	電子技術部
E1386	パワーサイクル試験	8時間まで	22,000	電子技術部
E1387	パワーサイクル試験 8時間増	8時間増すごとに	10,340	電子技術部
E1394	人工気象室（小型）	1時間ごとに	5,280	化学技術部
E1395	人工気象室（大型）	1時間ごとに	7,810	化学技術部
E1396	日射装置	1時間ごとに（人工気象室（大型）の料金に加算）	6,490	化学技術部

⑤ 音響・振動

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E4974	時間波形分析（振動）	1分析につき	3,300	機械・材料技術部
E4975	周波数分析（振動）	1分析につき	5,060	機械・材料技術部
E4976	振動試験	1時間当たり	8,360	機械・材料技術部
E4977	損失係数測定（A）	1試料1測定温度につき	12,210	機械・材料技術部
E4978	損失係数測定（B）　1測定温度増	1測定温度増すごとに	1,320	機械・材料技術部
E4979	振動試験　（大型の試験機によるもの）	1時間当たり	9,570	機械・材料技術部
E4980	騒音測定	1測定につき	2,530	機械・材料技術部
E4981	オクターブ分析	1分析につき	3,410	機械・材料技術部
E4982	時間波形分析（音）	1分析につき	3,300	機械・材料技術部
E4983	周波数分析（音）	1分析につき	5,060	機械・材料技術部
E4984	音響パワーレベル測定	1測定につき	10,120	機械・材料技術部
E4985	音圧分布測定	1測定面につき	15,180	機械・材料技術部
E4986	音質評価解析	1測定につき	5,720	機械・材料技術部
E4987	吸音率測定	1測定につき	4,290	機械・材料技術部

⑥ デザイン・造形

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0490	立形マシニングセンタによる加工	1時間当たり	6,490	情報・生産技術部
E0495	5軸制御マシニングセンタによる加工	1時間当たり	6,930	情報・生産技術部
E4990	機械設計・解析	1時間当たり	5,610	情報・生産技術部
E5001	弾塑性解析（塑性加工のシミュレーション解析）	1時間当たり	8,800	情報・生産技術部
E4994	構造解析	1時間当たり	8,690	機械・材料技術部
E4993	三次元モデリング　（簡易なもの）	1時間当たり	4,840	情報・生産技術部
E4997	三次元造形前処理	1時間当たり	3,190	情報・生産技術部
E4991	三次元造形 （小型インクジェット式3Dプリンター）	1時間当たり	660	情報・生産技術部
E4998	三次元造形 （インクジェット式3Dプリンター）	1時間当たり	2,750	情報・生産技術部
E5000	三次元造形 （光造形式3Dプリンター）	1時間当たり	1,430	情報・生産技術部
E4999	三次元造形後処理	1時間当たり	3,630	情報・生産技術部
E5280	デザイン・企画	1時間につき	3,300	情報・生産技術部

⑦ 寸法測定・形状測定

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E1051	三次元微細形状測定	標準1測定当たり	12,430	電子技術部
E1150	超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定	1測定1解析につき	8,800	電子技術部
E1151	超深度形状測定顕微鏡による観察及び形状測定 1解析増	1解析増すごとに	2,200	電子技術部
E0225	三次元座標測定（接触式測定）	1時間当たり	15,360	情報・生産技術部
E0230	三次元座標測定（光学式測定）	1時間当たり	8,140	情報・生産技術部
E0245	表面粗さ測定	1試料1ヶ所につき	1,430	情報・生産技術部
E0255	表面形状測定	1試料1ヶ所につき	1,760	情報・生産技術部
E0260	形状評価	1寸法につき	220	情報・生産技術部

⑧ 非破壊検査

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0960	X線透過試験	1時間当たり	7,590	機械・材料技術部
E0981	X線CT撮影	1測定につき	33,440	機械・材料技術部
E0990	非破壊超音波映像撮影	1時間当たり	9,570	電子技術部
E0991	非破壊超音波映像撮影 （データ解析のみ）	1解析当たり	3,740	電子技術部

⑨ 観察

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E0101	デジタルマイクロスコープ観察	1試料につき	2,640	機械・材料技術部
E0102	デジタルマイクロスコープ撮影	1撮影につき	1,100	機械・材料技術部
E1145	ハイブリッドレーザー顕微鏡	1測定1解析につき	8,690	電子技術部
E1146	ハイブリッドレーザー顕微鏡　1視野追加	1視野追加につき	4,290	電子技術部
E1780	走査型プローブ顕微鏡観察	標準1条件1測定につき	23,100	電子技術部
E1781	走査型プローブ顕微鏡観察　1視野追加	1視野追加につき	10,780	電子技術部
E4995	高速度カメラ撮影	1時間当たり	5,830	情報・生産技術部
E4996	高速度カメラ撮影 （アナログ波形データ収集装置併用）	1時間当たり	6,270	情報・生産技術部

⑩ バッテリー・燃料電池

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E3261	電池充放電試験（1）	1試料につき6時間まで	23,650	化学技術部
E3262	電池充放電試験（2）　6時間増	6時間増すごとに	10,670	化学技術部
E3263	電極の熱ロールプレス処理	1試料1時間につき	4,070	化学技術部
E3265	大型電池充放電試験（2kW以下）（1）	1試料につき6時間まで	9,020	化学技術部
E3266	大型電池充放電試験（2kW以下）（2） 6時間増	6時間増すごとに	5,940	化学技術部
E3280	試料調製（1）（比較的容易）	E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270に適用	3,190	化学技術部
E3290	試料調製（2）（比較的複雑）	E3211,E3212,E3221,E3222,E3223, E3224,E3261,E3262,E3270に適用	6,490	化学技術部
E3255	燃料電池の電極作製(スプレー塗工)	1時間当たり	4,730	化学技術部
E3241	燃料電池の発電試験	1時間当たり	7,700	化学技術部
E3253	燃料電池スタック試験（1）	24時間まで（8時間当たり）	4,510	化学技術部
E3254	燃料電池スタック試験（2）　24時間増	24時間増すごとに	7,150	化学技術部
E3251	燃料電池の露点測定（1）	24時間まで（1時間当たり）	4,180	化学技術部
E3252	燃料電池の露点測定（2）　24時間増	24時間増すごとに	25,520	化学技術部
E3242	電解質膜のガス透過性測定	1試料につき（1時間当たり）	6,050	化学技術部

（4） 微生物・生化学・食品

① 微生物・生化学・食品

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
E5011	一般生菌数測定	1試料につき	4,950	化学技術部
E5031	嫌気性菌数測定	1試料につき	6,380	化学技術部
E5036	抗菌性評価試験	1試料1測定につき	6,050	化学技術部
E5038	蛍光顕微鏡観察（生物試料）	1試料1測定につき	5,830	化学技術部
E5040	抗酸化性測定（1）	1試料につき	3,630	化学技術部
E5041	抗酸化性測定（2）（ORAC法による）	1試料につき	11,410	化学技術部
E5060	酵素阻害活性測定（1）（複雑なもの）	1試料につき	7,040	化学技術部
E5061	酵素阻害活性測定（2）（容易なもの）	1試料につき	5,060	化学技術部
E5062	抗糖化性測定（1）（複雑なもの）	1試料につき	6,710	化学技術部
E5063	抗糖化性測定（2）（容易なもの）	1試料につき	5,060	化学技術部
E5090	水分定量（常圧乾燥法による）	1試料につき	4,510	化学技術部
E5091	遊離アミノ酸組成分析	1試料につき	38,940	化学技術部
E5100	タンパク質定量 （Bradford法、Lowry法、BCA法による）	1試料につき	4,180	化学技術部
E5105	タンパク質電気泳動試験	1試料につき	6,930	化学技術部
E5110	脂質定量（ソックスレー抽出法による）	1試料につき	5,280	化学技術部
E5120	灰分定量（直接灰化法による）	1試料につき	5,280	化学技術部
E5130	総ポリフェノール定量 （Folin-Ciocalteu法による）	1試料につき	4,290	化学技術部
E5135	総アントシアニン定量 （pH differential法による）	1試料につき	6,380	化学技術部
E5136	総プロアントシアニジン定量	1試料につき	4,290	化学技術部
E5140	炭水化物定量（フェノール-硫酸法による）	1試料につき	9,900	化学技術部
E5150	リグニン定量（硫酸法による）	1試料につき	9,020	化学技術部
E5160	サフラン試験	1試料につき	28,710	化学技術部
E5170	凍結乾燥 （24時間まで）	24時間まで	5,940	化学技術部
E5171	凍結乾燥 （24時間増すごとに）	24時間増すごとに	2,640	化学技術部
E5175	凍結乾燥（温度制御有）（24時間まで）	24時間まで	11,550	化学技術部
E5176	凍結乾燥（温度制御有）（24時間増すごとに）	24時間増すごとに	8,030	化学技術部
E3325	冷却遠心分離	1試料1時間につき	5,060	化学技術部
E5180	試料調製（1）（簡易なもの）	E5011～E5176、E3325に適用	1,650	化学技術部
E5181	試料調製（2）（基本的なもの）	E5011～E5176、E3325に適用	3,630	化学技術部
E5182	試料調製（3）（複雑なもの）	E5011～E5176、E3325に適用	6,930	化学技術部
E5183	試料調製（4）（困難なもの）	E5011～E5176、E3325に適用	10,890	化学技術部

（5） その他（成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導）

① 成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	備　考
E5310	研究生の指導	1人1日につき	1,100	
E5320	研究生の指導　1人増	研究生1人増すごとに	550	
E5350	成績書の複本・データ等の交付	1通につき（写真を含む場合は別に加算することができる）	300	

2　機器使用料金

（1） 生産・加工機器

① 加工機器

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E7740	油圧プレス	小林機械工業	KU-CPP3366	110	情報・生産技術部
E7750	油圧プレス （ホットプレス）	セイブ	HP-2	220	情報・生産技術部
E8810	混練機	森山	DSI-5GHH-E	2,640	機械・材料技術部
E8820	金属粉末射出成形装置	東芝機械	IS30EPN-1A	2,090	機械・材料技術部

② 工作機器

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6210	コンターマシン	アマダ	VA-500	330	情報・生産技術部
E6230	平面研削盤	岡本	PSG-52DX	1,540	機械・材料技術部
E6240	ボール盤	ヤマモト	YSDT-550	110	機械・材料技術部
E6270	切断機	Hストルアス社	ﾃﾞｨｽｺﾄﾑ	1,320	機械・材料技術部
E6310	帯鋸盤	アマダ	HA300	880	情報・生産技術部
E6350	CNC旋盤	オークマ	LS-30N	5,170	機械・材料技術部
E6290	超精密正面切削装置	東芝機械	ULC-100A(H)	6,820	機械・材料技術部
E6340	旋盤	昌運	ST-5	1,210	機械・材料技術部
E6360	旋盤	シャブリン	SV-150A	1,980	機械・材料技術部
E6370	フライス盤	デッケル	FP1	2,310	機械・材料技術部
E6375	NCフライス盤	イワシタ	NR2	2,200	情報・生産技術部
E6380	立形マシニングセンタ	牧野フライス製作所	V33	3,190	情報・生産技術部
E6730	研磨機	ムサシノ電子	MA-200	2,640	電子技術部
E6735	自動研磨機	QATM社	サファイア250 A2-ECO	3,300	電子技術部
E7720	ツールチェンジNC加工機	平安コーポレーション	NC-151MC-1508	1,980	情報・生産技術部
E7730	ルータ	平安鉄工	NC-131P-1008	660	情報・生産技術部

③ 熱処理

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6620	電極形成装置の本体システム	KHエレクトロニクス	特別仕様	18,480	電子技術部
E6760	高温小型真空雰囲気炉	ナガノ	NEWTONIAN PASCAL40	6,600	電子技術部
E8840	電気炉	炉研工業	ﾏｯﾌﾙ型加熱炉 HI	1,210	機械・材料技術部
E8980	シリコニット箱型炉	シリコニット高熱工業	SFB-2040	880	機械・材料技術部
E8970	熱間加工再現試験装置	富士電波工機	ｻｰﾒｯｸﾏｽﾀｰZ	11,330	機械・材料技術部
E8975	熱処理再現試験装置	富士電波工機	特注品FTA-153VTほか	9,130	機械・材料技術部

④ 電子・半導体（加工）

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6620	電極形成装置の本体システム	KHエレクトロニクス	特別仕様	18,480	電子技術部
E6680	陽極接合装置	アユミ工業	AB-40特注品	12,430	電子技術部
E6690	マスクアライナ	ミカサ	MA-20	7,590	電子技術部
E6740	酸化拡散装置	KHエレクトロニクス	特別仕様	19,030	電子技術部
E6770	超音波ボールボンダ	ウエストボンド	7700A	7,040	電子技術部
E6790	チップ付け装置	ウエストボンド	7200A	2,530	電子技術部
E6810	超音波ウェッジボンダ	ウエストボンド	7400A	5,500	電子技術部

（ 電子・半導体（加工））

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E6840	ダイシング装置	ディスコ DAD-2H/6T	13,200	電子技術部
E6880	アッシャー装置	東京応化工業 OPM-EM600	12,540	電子技術部
E6980	焼き付け装置	デルタデザイン（米国） 9023型	880	電子技術部

（2） 環境試験・電磁環境試験機器

① 人工気象室

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E7310	人工気象室	タバイエスペック TBL-9W4YPX	23,320	化学技術部

② 電磁環境試験機器

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E8270	伝導イミュニティ測定システム	ノイズ研究所 ESS-B3011	3,630	電子技術部

③ 騒音・振動

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E7470	簡易半無響室	小野測器	1,540	機械・材料技術部

（3） 試料調製用機器

① 遠心分離機

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E8725	冷却遠心機	エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ CR21N	1,760	化学技術部

② 熱処理

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E6620	電極形成装置の本体システム	KHエレクトロニクス 特別仕様	18,480	電子技術部
E6760	高温小型真空雰囲気炉	ナガノ NEWTONIAN PASCAL40	6,600	電子技術部
E8840	電気炉	炉研工業 ﾏｯﾌﾙ型加熱炉 HI	1,210	機械・材料技術部
E8980	シリコニット箱型炉	シリコニット高熱工業 SFB-2040	880	機械・材料技術部
E8970	熱間加工再現試験装置	富士電波工機 ｻｰﾒｯｸﾏｽﾀｰZ	11,330	機械・材料技術部
E8975	熱処理再現試験装置	富士電波工機 特注品FTA-153VTほか	9,130	機械・材料技術部

③ 塗装

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E8910	乾式塗装ブース	サンエス工業 DS-CSS-1200	1,760	化学技術部

④ バイオ

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E9040	濃縮機 （遠心式濃縮機）	タイテック VC-96N	110	化学技術部
E9060	フレンチプレス細胞破砕機	アミンコ FA078	440	化学技術部

（4） 試験・計測機器

① 形状測定

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E7830	表面形状測定装置	東京精密	サーフコム NEX241 SD2-13	1,980	情報・生産技術部

② 厚さ・膜厚

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6950	光干渉式膜厚測定装置	大日本スクリーン	VM-8000J	3,080	電子技術部
E7830	表面形状測定装置	東京精密	サーフコム NEX241 SD2-13	1,980	情報・生産技術部
E8150	膜厚計	小坂研究所	ET4000AKR	2,860	電子技術部

③ 強度試験機

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6050	材料試験機（5kN）	インストロンジャパン	5565型	1,210	化学技術部
E8711	振動試験機	IMV	VS-2000A-140T	5,060	機械・材料技術部
E8712	振動試験機 （大型）	IMV	i250/SA5M	6,160	機械・材料技術部
E8713	制振性能測定装置	ブリュエルケアー	PULSE/MS-18143型	4,290	機械・材料技術部
E8970	熱間加工再現試験装置	富士電波工機	サーメックマスターZ	11,330	機械・材料技術部
E8975	熱処理再現試験装置	富士電波工機	特注品FTA-153VTほか	9,130	機械・材料技術部
E6080	万能材料試験機	オリエンテック	UTA-5T	990	情報・生産技術部

④ 物理特性試験機

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6660	ボロメータ評価システム用高温電気測定用チャンバ	テクノロ工業	特別仕様	4,510	電子技術部
E6670	ボロメータ評価システム用光源システム	日本分光	SS-25GT	12,100	電子技術部
E8010	薄膜屈折率測定装置	溝尻光学	DHA-XA型	8,800	電子技術部
E8090	ボロメータ測定システム微小信号測定システム	セイコー	5302	4,950	電子技術部
E8250	分光測色計	ミノルタカメラ	CM-1000	440	化学技術部
E8251	光沢計	日本電色工業	VGS-300A	220	化学技術部
E8260	音響インテンシティ測定装置	小野測器	CF6400INT/MOD	10,120	機械・材料技術部
E8261	音質評価システム	小野測器	WS-5160	660	機械・材料技術部
E8262	吸音率測定システム	小野測器	SR-4100	990	機械・材料技術部
E8550	風合い計測システム	カトーテック	KES-F7サーモラボⅡ	3,300	化学技術部
E8580	プラスチック用熱伝導率計	京都電子工業	QTM-D3型	4,730	化学技術部
E8620	赤外線放射計	日本バーンズ	SA-200	8,140	化学技術部
E9016	摩耗試験機 （研磨紙使用無し）	東洋精機	NO410 GS10付	110	情報・生産技術部

⑤ 電気計測機器

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E8040	C－V測定装置	YHP	4280A	5,830	電子技術部
E8190	マルチフリケンシャルLCRメータ	YHP	YHP4274A/ YHP4275A	2,860	電子技術部
E8200	絶縁抵抗計	キーサイト・テクノロジー	4339B	3,080	電子技術部
E8220	Qメータ	YHP	YHP4285A	2,970	電子技術部
E8370	EMI予備測定システム	HP	EMI簡易測定システム	3,520	電子技術部

（ 電気計測機器 ）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E8430	ガウスメータ（最小測定レンジ:2mT、最大測定レンジ:2T）	ベル	9200型	880	電子技術部
E8431	ガウスメータ（最小測定レンジ:0.35mT、最大測定レンジ:3.5T）	Lake shore Inc	455型	1,320	電子技術部
E9090	電磁界解析装置	独国CST社	MW-Studio Transient Solver	1,760	電子技術部

（5） 分析・評価機器（観察）

① 光学顕微鏡

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E7150	デジタルマイクロスコープ	ハイロックス	HRX-01	1,980	機械・材料技術部
E7151	コードレスマイクロスコープ	スカラ	DG-3	110	情報・生産技術部
E6960	超深度形状測定顕微鏡 （レーザー顕微鏡）	キーエンス	VK8500	1,980	電子技術部
E6965	ハイブリッドレーザー顕微鏡 データ解析	レーザーテック	OPTELICS HYBRID	990	電子技術部
E7020	金属顕微鏡	ニコン	X2-T1-NR	550	機械・材料技術部
E7160	顕微鏡	オリンパス	CKX41N-31PHP	330	化学技術部
E7180	蛍光顕微鏡（生物試料）	サーモフィッシャーサイエンティフィック	AMF5000	2,420	化学技術部
E7810	万能測定顕微鏡	カールツァイス	UMM300/100	2,200	情報・生産技術部

② 内部観察機器

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E7230	X線透視装置	島津製作所	SMX-2000	4,290	機械・材料技術部
E7240	X線CTスキャン装置	ユニハイトシステム	XVA-160 Noix+Presto	12,100	機械・材料技術部
E7280	透明プラスチック残留応力観察装置	理光研	ﾎﾟﾗﾘｽｺｰﾌﾟPS-5	1,540	化学技術部

（6） 分析・評価機器（ 物性〔光、熱、音振、エネルギー〕）

① 光学機器

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6650	定エネルギー分光器	日本分光	YQ-250CW-GT	11,990	電子技術部
E8020	位相差測定装置	ニコン	NPDM-1000	7,920	電子技術部

② 分光分析

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E6650	定エネルギー分光器	日本分光	YQ-250CW-GT	11,990	電子技術部
E9061	マルチ検出モードプレートリーダー	テカンジャパン	Infinite200Pro	1,320	化学技術部
E7170	分光蛍光光度計	日立	F-4010	4,400	化学技術部

③ 熱分析

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式		料金	担当部名
E7360	断熱反応装置	コロンビアサイエンティフィック	ARC	8,360	化学技術部
E7370	熱流束型熱量計	セタラム	C-80	19,030	化学技術部
E8610	熱機械試験機	マック・サイエンス	TMA-4000	5,610	化学技術部

④ 反応熱量計

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
E7360	断熱反応装置	コロンビアサイエンティフィック ARC	8,360	化学技術部
E7370	熱流束型熱量計	セタラム C-80	19,030	化学技術部

（7） その他（製品開発室・ファブラボ）

① 製品開発室

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	所 在	料金	担当部名
E9210	製品開発室	実験棟 1・2・4階	81	事業化支援部
E9220	ドラフトチャンバー（製品開発室）	実験棟 1階	234	事業化支援部

② ファブラボ

単位：円（1時間当たり）

No.	設 備 機 器 名	所 在	料金	担当部名
E9610	ファブラボ（Ⅰ）	3Dプリンタ使用可 装置類取扱い指導有	3,300	電子技術部
E9620	ファブラボ（Ⅱ）	3Dプリンタ使用可 装置類取扱い指導無	550	電子技術部
E9630	ファブラボ（Ⅲ）	3Dプリンタ使用不可 装置類取扱い指導無	220	電子技術部

溝の口支所　（川崎技術支援部）

1　試験計測料金

（1） 材料解析分野

① 機器分析

走査型X線光電子分光分析装置（μ-XPS・μ-ESCA）　単位：円

No.	項　目	単　位	料金	担当部名
K5002	X線光電子分光分析（XPS） 表面分析（ワイドスキャンのみ）	1試料1ヶ所につき（ワイドスキャンのみ）	26,950	川崎技術支援部
K5005	X線光電子分光分析（XPS） 表面分析（ワイドスキャンのみ 追加試料）	追加1試料1ヶ所につき（ワイドスキャンのみ）	21,120	川崎技術支援部
K5007	X線光電子分光分析（XPS） 表面分析（ワイドスキャンのみ　条件増）	1条件増すごとに（ワイドスキャンのみ）	5,610	川崎技術支援部
K5011	X線光電子分光分析（XPS） 表面分析（ワイドおよびナロースキャン）	1試料1条件につき（ワイドおよびナロースキャン）	48,180	川崎技術支援部
K5012	X線光電子分光分析（XPS） 表面分析（ワイドおよびナロースキャン 条件増）	1条件増すごとに（面分析、状態分析加算等）	11,110	川崎技術支援部
K5010	X線光電子分光分析（XPS）深さ方向分析	1試料1条件につき（主成分のみ、深さ0.2μmまで）	85,200	川崎技術支援部
K5015	X線光電子分光分析（XPS）深さ方向分析　条件増	1条件増すごとに	11,110	川崎技術支援部

フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）　単位：円

No.	項　目	単　位	料金	担当部名
K5050	フーリエ変換赤外分光分析（FT-IR）　簡易な測定	1試料1条件につき	10,230	川崎技術支援部
K5055	フーリエ変換赤外分光分析（FT-IR）	1試料1条件につき	19,800	川崎技術支援部 E2021
K5056	フーリエ変換赤外分光分析（FT-IR）　条件追加	1条件追加につき	10,230	川崎技術支援部

微小蛍光X線分析装置（XRF）　単位：円

No.	項　目	単　位	料金	担当部名
K1210	微小部蛍光X線分析（XRF）	1試料1条件につき	8,030	川崎技術支援部
K1211	微小部蛍光X線分析（XRF）　条件追加	1条件追加につき	3,410	川崎技術支援部
K1212	微小部蛍光X線分析（XRF）　面分析	面分析1条件につき（5元素まで）	13,750	川崎技術支援部
K1213	微小部蛍光X線分析（XRF）　面分析　条件追加	面分析1条件追加につき	2,310	川崎技術支援部

金属顕微鏡　単位：円

項目No.	項　目	単　位	料金	担当部名
K5110	金属組織写真撮影	写真1枚につき	10,560	川崎技術支援部 E0031
K5112	外観写真撮影	写真1枚につき	5,280	川崎技術支援部
K5114	写真撮影1ヶ所増すごとに	同一試料で1ヶ所増すごとに	2,970	川崎技術支援部 E0070
K5120	顕微鏡試料調製（第1種）：容易なもの	1試料につき	1,870	川崎技術支援部 E0080
K5121	顕微鏡試料調製（第2種）：標準的なもの	1試料につき	3,630	川崎技術支援部 E0090
K5122	顕微鏡試料調製（第3種）：比較的複雑なもの	1試料につき	7,260	川崎技術支援部 E0091
K5123	顕微鏡試料調製（第4種）：非常に複雑なもの	1試料につき	10,560	川崎技術支援部 E0092

デジタルマイクロスコープ

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1910	デジタルマイクロスコープ	画像1枚につき	4,510	川崎技術支援部

マイクロフォーカスX線検査装置（μF-X線）

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1720	マイクロフォーカスX線検査装置	30分以内	6,930	川崎技術支援部
K1725	マイクロフォーカスX線検査装置　追加	追加15分あたり	2,970	川崎技術支援部

硬さ試験機

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K5330	硬さ試験	1点につき	990	川崎技術支援部 E0180
K5340	硬さ試験試料調整（第1種）：容易なもの	1試料につき	1,870	川崎技術支援部
K5341	硬さ試験試料調整（第2種）：比較的容易なもの	1試料につき	3,630	川崎技術支援部

②　温湿度環境試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K5410	恒温恒湿槽（中）	24時間まで	19,580	川崎技術支援部 E1230
K5411	恒温恒湿槽（中）　24時間増	24時間増すごとに	7,590	川崎技術支援部 E1240
K5415	恒温恒湿槽（中）　サイクル	24時間まで	25,300	川崎技術支援部 E1270
K5416	恒温恒湿槽（中）　サイクル　24時間増	24時間増すごとに	8,690	川崎技術支援部 E1280
K5420	恒温恒湿槽（小）	24時間まで	16,830	川崎技術支援部
K5421	恒温恒湿槽（小）　24時間増	24時間増すごとに	5,830	川崎技術支援部
K5425	恒温恒湿槽（小）　サイクル	24時間まで	21,780	川崎技術支援部
K5426	恒温恒湿槽（小）　サイクル　24時間増	24時間増すごとに	6,820	川崎技術支援部
K5430	恒温槽	24時間まで	11,000	川崎技術支援部
K5431	恒温槽　24時間増	24時間増すごとに	5,610	川崎技術支援部
K5440	プレッシャークッカー試験	24時間まで	19,140	川崎技術支援部 E1320
K5441	プレッシャークッカー試験　24時間増	24時間増すごとに	11,990	川崎技術支援部 E1330
K5450	冷熱衝撃試験（小）	8時間まで	9,680	川崎技術支援部
K5451	冷熱衝撃試験（小）　8時間増	8時間増すごとに	4,840	川崎技術支援部

③　電気計測試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K5610	絶縁抵抗測定（平板試料）	1試料につき	6,050	川崎技術支援部

（2） 微細構造解析分野

電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM / EDS）　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1010	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） 5万倍以下	観察倍率5万倍以下　1条件につき	20,350	川崎技術支援部
K1015	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） 5万倍以下　条件追加	観察倍率5万倍以下　1条件追加につき	4,510	川崎技術支援部
K1020	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） 5万倍を超えて10万倍以下	観察倍率5万倍を超えて10万倍以下　1条件につき	29,370	川崎技術支援部
K1025	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） 5万倍を超えて10万倍以下　条件追加	観察倍率5万倍を超えて10万倍以下　1条件追加につき	9,020	川崎技術支援部
K1030	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） 10万倍を超えるもの	観察倍率10万倍を超えるもの　1条件につき	51,920	川崎技術支援部
K1035	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） 10万倍を超えるもの　条件追加	観察倍率10万倍を超えるもの　1条件追加につき	14,630	川崎技術支援部
K1040	FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置（EDS）	1条件につき	14,850	川崎技術支援部
K1041	FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置（EDS） 条件追加	1条件追加につき	4,510	川崎技術支援部
K1042	FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置（EDS） 面分析	面分析1条件につき	16,060	川崎技術支援部
K1050	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） SEM観察　10～15視野	1試料の観察視野が10～15視野につき（観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る）	113,080	川崎技術支援部
K1052	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） SEM観察　16～30視野	1試料の観察視野が16～30視野につき（観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る）	169,840	川崎技術支援部
K1055	電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM） SEM観察　条件追加	1条件追加につき	11,220	川崎技術支援部

高分解能分析走査電子顕微鏡（FE-SEM / EDS）　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1310	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　5万倍以下	観察倍率5万倍以下 1試料1視野観察につき	20,240	川崎技術支援部 E0011
K1315	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　5万倍以下 1視野追加	観察倍率5万倍以下 同一試料において1視野追加観察につき	4,400	川崎技術支援部 E0012
K1320	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　5万倍を超えて10万倍以下	観察倍率5万倍を超えて10万倍以下　1試料1視野観察につき	29,260	川崎技術支援部 E0013
K1325	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加	観察倍率5万倍を超えて10万倍以下　同一試料において1視野追加観察につき	8,910	川崎技術支援部 E0014
K1330	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　10万倍を超えるもの	観察倍率10万倍を超えるもの 1試料1視野観察につき	51,920	川崎技術支援部 E0015
K1335	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　10万倍を超えるもの 1視野追加	観察倍率10万倍を超えるもの 同一試料において1視野追加観察につき	14,630	川崎技術支援部 E0016
K1392	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　10～15視野	1試料の観察視野が10～15視野につき（観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る）	112,860	川崎技術支援部 E0017
K1395	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　16～30視野	1試料の観察視野が16～30視野につき（観察倍率関係なし。ただし、設定可能な試料に限る）	169,290	川崎技術支援部 E0018
K1342	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS）　SEM観察　低真空モード	低真空モードの使用	11,220	川崎技術支援部

（高分解能分析走査電子顕微鏡（FE-SEM / EDS））

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1343	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS） SEM観察　STEM	透過像観察機能（STEM）の使用	11,220	川崎技術支援部
K1340	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS） SEM観察　1条件追加	1条件追加につき	11,220	川崎技術支援部
K1345	高分解能分析走査電子顕微鏡 （FE-SEM/EDS） SEM観察　Arクリーナー	Arクリーナーの使用10分につき	2,200	川崎技術支援部
K1350	高分解能分析FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置 （EDS） 点分析	点分析1視野1箇所につき	16,830	川崎技術支援部
K1351	高分解能分析FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置 （EDS） 点分析追加	点分析同一視野内で1箇所追加につき	5,500	川崎技術支援部
K1352	高分解能分析FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置 （EDS） 線分析	線分析1視野1箇所につき	22,550	川崎技術支援部
K1353	高分解能分析FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置 （EDS） 線分析追加	線分析同一視野内で1箇所追加につき	8,470	川崎技術支援部
K1354	高分解能分析FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置 （EDS） 面分析	面分析1視野につき	33,770	川崎技術支援部
K1356	高分解能分析FE-SEM　エネルギー分散型X線分析装置 （EDS） 各種データ処理	各種データ処理1条件につき	5,500	川崎技術支援部

電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM / EDS）　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1440	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 10万倍以下	倍率　10万倍以下　1視野につき	17,710	川崎技術支援部
K1445	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 10万倍以下　1視野増	倍率　10万倍以下　1視野増すごとに	8,800	川崎技術支援部
K1441	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 10万倍を超えて50万倍以下	倍率　10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき	23,430	川崎技術支援部
K1446	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 10万倍を超えて50万倍以下　1視野増	倍率　10万倍を超えて50万倍以下 1視野増すごとに	13,310	川崎技術支援部
K1450	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 50万倍を超えて200万倍以下	倍率　50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき	32,340	川崎技術支援部
K1455	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 50万倍を超えて200万倍以下　1視野増	倍率　50万倍を超えて200万倍以下 1視野増すごとに	17,710	川崎技術支援部
K1451	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 200万倍を超えるもの	倍率　200万倍を超えるもの 1視野につき	46,860	川崎技術支援部
K1456	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 200万倍を超えるもの　1視野増	倍率　200万倍を超えるもの 1視野増すごとに	27,830	川崎技術支援部
K1460	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 試料傾斜調整	試料傾斜調整　1条件ごとに	12,210	川崎技術支援部
K1470	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 制限視野回折	制限視野回折　1視野につき	15,730	川崎技術支援部
K1471	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 微小領域回折	微小領域回折　1視野につき	27,830	川崎技術支援部
K1472	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 明視野像	明視野像　1視野につき	17,710	川崎技術支援部
K1473	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 暗視野像	暗視野像　1視野につき	32,230	川崎技術支援部
K1510	電界放出型分析透過電子顕微鏡 （FE-TEM/EDS） 点分析	点分析　1試料1測定点につき	26,620	川崎技術支援部
K1515	電界放出型分析透過電子顕微鏡 （FE-TEM/EDS） 点分析追加	点分析　同一試料において1測定点追加につき	5,500	川崎技術支援部

（電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM / EDS））

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1540	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM/EDS） 定量分析	定量分析　1試料1測定点につき	22,660	川崎技術支援部
K1545	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM/EDS） 定量分析追加	定量分析　同一試料において1測定点追加につき	6,710	川崎技術支援部
K1520	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM/EDS） 線分析	線分析　1測定5元素までごとに	66,990	川崎技術支援部
K1530	電界放出型分析透過電子顕微鏡（FE-TEM/EDS） 面分析	面分析　1視野5元素ごとに、または2時間につき	104,170	川崎技術支援部

分析透過電子顕微鏡（FE-TEM / EDS）　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1740	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 10万倍以下	観察倍率10万倍以下　1視野につき	18,590	川崎技術支援部
K1741	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 10万倍以下　1視野追加	観察倍率10万倍以下　同条件1視野追加につき	9,350	川崎技術支援部
K1745	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 10万倍を超えて50万倍以下	観察倍率10万倍を超えて50万倍以下　1視野につき	24,200	川崎技術支援部
K1746	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 10万倍を超えて50万倍以下　1視野追加	観察倍率10万倍を超えて50万倍以下　同条件1視野追加につき	13,970	川崎技術支援部
K1750	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 50万倍を超えて200万倍以下	観察倍率50万倍を超えて200万倍以下　1視野につき	33,330	川崎技術支援部
K1751	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 50万倍を超えて200万倍以下　1視野追加	観察倍率50万倍を超えて200万倍以下　同条件1視野追加につき	18,480	川崎技術支援部
K1755	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 200万倍を超えるもの	観察倍率200万倍を超えるもの　1視野につき	48,180	川崎技術支援部
K1756	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 200万倍を超えるもの　1視野追加	観察倍率200万倍を超えるもの　同条件1視野追加につき	29,040	川崎技術支援部
K1760	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 試料傾斜調整	試料傾斜調整　1条件につき	12,430	川崎技術支援部
K1761	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 制限視野回折	制限視野回析　1視野につき	16,060	川崎技術支援部
K1768	分析透過電子顕微鏡（FE-TEM） 観察 条件追加	1条件追加につき	11,110	川崎技術支援部
K1770	FE-TEM　エネルギー分散型X線分析装置（EDS）面分析	面分析　1視野5元素ごとに、または2時間につき	103,400	川崎技術支援部

TEM試料調製　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1550	TEM　データ処理	各種データ処理　1条件につき	11,110	川崎技術支援部
K1410	TEM試料調製　分散法　ふりかけ法	ふりかけ法　1試料につき	6,050	川崎技術支援部
K1411	TEM試料調製　分散法　懸濁法	懸濁法　1試料につき	11,990	川崎技術支援部
K1415	TEM試料調製　電解研磨法	1試料につき	27,390	川崎技術支援部
K1420	TEM試料調製　イオンミリング法　易	1試料につき	100,760	川崎技術支援部
K1421	TEM試料調製　イオンミリング法　中	1試料につき	201,520	川崎技術支援部
K1422	TEM試料調製　イオンミリング法　難	1試料につき	297,000	川崎技術支援部
K1425	TEM試料調製　低エネルギーイオンミリング（ジェントルミル）	1試料1条件につき	13,530	川崎技術支援部
K1432	TEM試料調製　電子染色	1試料につき	27,830	川崎技術支援部
K1433	TEM試料調製　樹脂包埋	1試料につき	13,420	川崎技術支援部
K1620	TEM試料調製　FIB-リフトアウト法	1試料につき	81,730	川崎技術支援部
K1621	TEM試料調製　FIB-リフトアウト法　条件追加	1条件追加につき	29,260	川崎技術支援部

（TEM試料調製）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1625	TEM試料調製　FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン	低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき	111,980	川崎技術支援部
K1663	TEM試料調製　FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン　試料作製のみ	低加速ガリウムイオン仕上げ 1試料につき（試料作製のみ）	129,690	川崎技術支援部
K1626	TEM試料調製　FIB-マイクロプロービング法 低加速ガリウムイオン条件追加	低加速ガリウムイオン仕上げ 1条件追加につき	29,590	川崎技術支援部
K1627	TEM試料調製　FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング	アルゴンイオンミリング仕上げ 1試料につき	125,840	川崎技術支援部
K1666	TEM試料調製　FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング　試料作製のみ	アルゴンイオンミリング仕上げ 1試料につき（試料作製のみ）	143,550	川崎技術支援部
K1628	TEM試料調製　FIB-マイクロプロービング法 アルゴンイオンミリング条件追加	アルゴンイオンミリング仕上げ 1条件追加につき	29,590	川崎技術支援部

集束イオンビーム装置（FIB）　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1640	集束イオンビーム装置（FIB）	1時間以内	33,660	川崎技術支援部
K1641	集束イオンビーム装置（FIB）　追加	追加1時間あたり	28,600	川崎技術支援部
K1642	集束イオンビーム装置（FIB）（連続自動加工）	追加1時間あたり（ただし、設定可能なものに限る）	16,500	川崎技術支援部
K1650	FIBオプション　カーボン膜デポジション	10分あたり	2,420	川崎技術支援部
K1651	FIBオプション　タングステン膜デポジション	10分あたり	2,420	川崎技術支援部
K1660	FIBオプション　マイクロプロービングシステム	1時間あたり	18,150	川崎技術支援部
K1670	FIBオプション　アルゴンイオンミリング	30分あたり	11,330	川崎技術支援部
K1680	FIB付属のSEM	1試料1視野観察につき	20,460	川崎技術支援部
K1681	FIB付属のSEM　視野追加	同一試料において1視野追加観察につき	4,620	川崎技術支援部
K1682	FIB付属のSEM　条件追加	同一試料において1条件追加につき	4,620	川崎技術支援部
K1690	FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　点分析	点分析1視野1箇所につき	16,940	川崎技術支援部
K1691	FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　点分析追加	点分析同一視野内で1箇所追加につき	5,830	川崎技術支援部
K1694	FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　線分析	線分析1視野1箇所につき	22,550	川崎技術支援部
K1695	FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　線分析追加	線分析同一視野内で1箇所追加につき	8,800	川崎技術支援部
K1692	FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　面分析	面分析1視野につき	33,880	川崎技術支援部
K1696	FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　各種データ処理	各種データ処理1条件につき	5,720	川崎技術支援部
K1672	FIB-SEMによる　三次元再構築用連続断面画像の取得	1測定につき	110,770	川崎技術支援部
K1674	FIB-SEMによる　三次元再構築用連続断面画像の取得条件追加	1条件追加につき	11,000	川崎技術支援部
K1730	FIB-SEMによる　微小試験片の作製　標準	標準的な作製（SEM観察含む） 5本につき	178,090	川崎技術支援部
K1732	FIB-SEMによる　微小試験片の作製　複雑	複雑な作製（SEM観察含む） 5本につき	266,860	川崎技術支援部
K1735	FIB-SEMによる　微小試験片の作製　条件追加	1条件追加につき	11,110	川崎技術支援部
K1610	マニピュレーターによるサンプリング	1試料につき	5,610	川崎技術支援部
K1630	レーザーマーキング	15分以内	4,950	川崎技術支援部
K1635	レーザーマーキング　追加	追加15分あたり	3,960	川崎技術支援部

マルチ解析用集束イオンビーム装置（FIB）　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1940	マルチ解析用集束イオンビーム装置（FIB）	1時間以内	33,330	川崎技術支援部
K1941	マルチ解析用集束イオンビーム装置（FIB）　追加	追加1時間あたり	28,820	川崎技術支援部
K1942	マルチ解析用集束イオンビーム装置（FIB） （連続自動加工）	追加1時間あたり （ただし、設定可能なものに限る）	16,500	川崎技術支援部
K1950	マルチ解析用FIBオプション カーボン膜デポジション	10分あたり	2,310	川崎技術支援部
K1951	マルチ解析用FIBオプション プラチナ膜デポジション	10分あたり	2,200	川崎技術支援部
K1955	マルチ解析用FIBオプション　Easy Lift	1時間あたり	17,930	川崎技術支援部
K1960	マルチ解析用FIB付属のSEM	1試料1視野観察につき	20,130	川崎技術支援部
K1961	マルチ解析用FIB付属のSEM　　視野追加	同一試料において1視野追加観察につき	4,510	川崎技術支援部
K1962	マルチ解析用FIB付属のSEM　　条件追加	同一試料において1条件追加につき	4,510	川崎技術支援部
K1965	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション 低真空	低真空モードの使用	11,110	川崎技術支援部
K1970	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　　点分析	点分析1視野1箇所につき	16,610	川崎技術支援部
K1971	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　　点分析追加	点分析同一視野内で1箇所追加につき	5,610	川崎技術支援部
K1974	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　　線分析	線分析1視野1箇所につき	22,220	川崎技術支援部
K1975	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　　線分析追加	線分析同一視野内で1箇所追加につき	8,470	川崎技術支援部
K1976	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　　面分析	面分析1視野につき	33,440	川崎技術支援部
K1978	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EDS分析測定　　各種データ処理	各種データ処理1条件につき	5,720	川崎技術支援部
K1980	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定　　結晶方位マップ	結晶方位マップ1視野につき	45,430	川崎技術支援部
K1981	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定　　視野追加	同一試料で1視野追加につき	11,110	川崎技術支援部
K1984	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定　　条件追加	1条件追加につき	11,110	川崎技術支援部
K1985	マルチ解析用FIB付属のSEMオプション EBSD分析測定　　各種データ処理	各種データ処理1条件につき	5,720	川崎技術支援部
K1990	マルチ解析用FIB-SEMによる三次元再構築用連続断面画像の取得	1測定につき	110,660	川崎技術支援部
K1995	マルチ解析用FIB-SEMによる三次元再構築用連続断面画像の取得　　条件追加	1条件追加につき	11,110	川崎技術支援部
K1930	マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製　標準	標準的な作製（SEM観察含む）5本につき	177,100	川崎技術支援部
K1932	マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製　複雑	複雑な作製（SEM観察含む）5本につき	265,760	川崎技術支援部
K1935	マルチ解析用FIB-SEMによる微小試験片の作製　条件追加	1条件追加につき	11,110	川崎技術支援部

画像解析システム　　単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K1832	画像解析システム　三次元再構築	1測定対象につき	56,760	川崎技術支援部
K1834	画像解析システム　三次元データ処理	1条件追加につき	11,220	川崎技術支援部
K1840	画像解析システム　画像解析	1測定対象につき	23,210	川崎技術支援部
K1842	画像解析システム　データ処理	1条件追加につき	5,720	川崎技術支援部

（3） 光機能分野

① 光触媒評価

光触媒JIS試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K3010	光触媒の窒素酸化物除去性能試験	1試料につき	66,880	川崎技術支援部
K3015	光触媒の窒素酸化物除去性能試験 －再生率－	1試料につき	21,120	川崎技術支援部
K3050	光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験	1試料につき	47,850	川崎技術支援部
K3055	光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 －バッグ法	1試料につき	44,110	川崎技術支援部
K3060	光触媒のトルエン除去性能試験	1試料につき	44,330	川崎技術支援部
K3070	光触媒のホルムアルデヒド除去性能試験	1試料につき	60,060	川崎技術支援部
K3020	光触媒のセルフクリーニング試験 湿式分解性能の測定	1試料につき	48,400	川崎技術支援部
K3030	光触媒のセルフクリーニング試験 水接触角の測定	1試料につき	66,880	川崎技術支援部
K3080	光触媒の水浄化性能試験（JISR1704準拠） （明条件のみ）	1試料につき	83,930	川崎技術支援部
K3085	光触媒の水浄化性能試験（JISR1704準拠） （暗条件のみ）	1試料につき	83,930	川崎技術支援部
K3105	光触媒性能試験JIS試験条件不成立時 （試験途中中止時）	1試料につき	22,770	川崎技術支援部
K3110	光触媒試料調製	処理時間30分につき	3,410	川崎技術支援部

光触媒性能応用評価試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K3122	その他光触媒性能試験	1時間につき	6,820	川崎技術支援部
K3090	空気清浄機によるたばこ煙成分の脱臭試験 （JEM1467に準じた試験法）	1試験につき	68,200	川崎技術支援部
K3042	水接触角の測定（光触媒JIS試験以外）	1試料1点につき	4,950	川崎技術支援部
K3047	水接触角の測定（光触媒JIS試験以外）追加	1点追加につき	1,210	川崎技術支援部
K3110	光触媒試料調製	処理時間30分につき	3,410	川崎技術支援部

② 太陽電池評価

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K3310	太陽電池のIPCE測定	1試料につき	39,710	川崎技術支援部
K3312	太陽電池のIPCE測定　追加	1試料または1条件追加につき	11,220	川崎技術支援部
K3320	太陽電池のI-V測定	1試料につき	40,700	川崎技術支援部
K3322	太陽電池のI-V測定　追加	1試料または1条件追加につき	11,440	川崎技術支援部
K3330	太陽電池のI-V測定　LED特定波長	1試料につき	29,370	川崎技術支援部
K3332	太陽電池のI-V測定　LED特定波長　追加	1試料または1条件追加につき	8,800	川崎技術支援部
K3620	低照度環境下におけるI-V測定	1条件につき	5,500	川崎技術支援部
K3622	低照度環境下におけるI-V測定　追加	1試料または1条件追加につき	2,640	川崎技術支援部
K3350	XeランプSSによる連続照射	24時間につき	21,340	川崎技術支援部
K3352	XeランプSSによる連続照射　追加	追加24時間につき	18,810	川崎技術支援部
K3360	LED-SSによる特定波長の光照射	24時間につき	29,150	川崎技術支援部
K3362	LED-SSによる特定波長の光照射　追加	追加24時間につき	26,620	川崎技術支援部

（太陽電池評価）

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K3610	2灯式SSによる連続照射	24時間につき	49,280	川崎技術支援部
K3612	2灯式SSによる連続照射　追加	追加24時間につき	47,630	川崎技術支援部
K3630	低照度光源による光照射	1時間につき	4,180	川崎技術支援部
K3632	低照度光源による光照射　24時間	24時間につき	28,820	川崎技術支援部
K3640	無抵抗電流計による電流値測定	1時間につき	1,210	川崎技術支援部
K3642	無抵抗電流計による電流値測定　24時間	24時間につき	8,800	川崎技術支援部
K3650	データロガーによる測定	1時間につき	1,210	川崎技術支援部
K3652	データロガーによる測定　24時間	24時間につき	9,020	川崎技術支援部
K3655	オシロスコープ	1時間につき	2,090	川崎技術支援部
K3657	オシロスコープ　24時間	24時間につき	10,230	川崎技術支援部
K3390	連続光照射に伴う簡易なI-V測定	1回につき	3,410	川崎技術支援部
K3395	太陽電池のインピーダンス測定	1試料につき	14,190	川崎技術支援部
K3420	発電面積規定用遮光マスク（面積測定済み）	1枚につき	1,870	川崎技術支援部

③ 光学特性評価

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K3450	紫外・可視分光光度計による透過率・反射率測定	1試料1条件につき	6,270	川崎技術支援部
K3452	紫外・可視分光光度計による透過率・反射率測定　追加	追加1条件につき	3,630	川崎技術支援部
K3460	分光照度計による照度、演色性、色温度などの測定	1試料1測定（5回測定）につき	2,090	川崎技術支援部
K3470	分光放射照度計によるスペクトル測定	1測定につき	10,010	川崎技術支援部
K3670	色彩輝度計による輝度・色度・相関色温度の測定	1測定につき	4,620	川崎技術支援部
K3672	色彩輝度計による輝度・色度・相関色温度の測定　追加	1測定追加につき	2,970	川崎技術支援部
K3680	色差計による色差の測定	1測定につき	3,300	川崎技術支援部
K3690	赤外線サーモグラフィーによる温度測定	1測定につき	2,750	川崎技術支援部
K3660	光学測定に関わる作業	1時間につき	7,040	川崎技術支援部

④ 光劣化促進試験

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K3431	紫外線照射試験機（東洋精機製作所　Atlas　UV test）	24時間につき	5,830	川崎技術支援部
K3434	紫外線照射試験機（東洋精機製作所　Atlas　UV test）連続100時間	連続運転100時間につき	21,230	川崎技術支援部
K3436	紫外線照射試験機 UV-B, C（東洋精機製作所　Atlas UV test）	24時間につき	6,820	川崎技術支援部
K3437	紫外線照射試験機 UV-B, C（東洋精機製作所　Atlas UV test）　連続100時間	連続運転100時間につき	23,540	川崎技術支援部
K3440	小型Xe耐光試験機（東洋精機製作所　Atlas SUNTEST XLS+）	24時間につき	7,150	川崎技術支援部
K3442	小型Xe耐光試験機（東洋精機製作所　Atlas SUNTEST XLS+）　連続100時間	連続運転100時間につき	24,420	川崎技術支援部

（4） 試料前処理 （前項までの試験の各項目に適用）

単位：円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K4120	試料前処理（切断、導電処理等）	処理時間30分につき	1,650	川崎技術支援部
K4210	精密機械研磨法　　A：容易な試料	1試料につき	11,220	川崎技術支援部
K4212	精密機械研磨法　　B：標準的な試料	1試料につき	22,550	川崎技術支援部
K4214	精密機械研磨法　　C：複雑な試料	1試料につき	33,770	川崎技術支援部
K4216	精密機械研磨法　　D：非常に複雑な試料	1試料につき	44,990	川崎技術支援部
K4217	精密機械研磨法　条件追加	1条件追加につき	5,610	川崎技術支援部
K4220	試料の撮影	1試料1視野につき	2,310	川崎技術支援部
K4230	断面イオンミリング法　（小さい試料用） A：容易な試料	1試料につき	22,330	川崎技術支援部
K4232	断面イオンミリング法　（小さい試料用） B：標準的な試料	1試料につき	44,440	川崎技術支援部
K4234	断面イオンミリング法　（小さい試料用） C：複雑な試料	1試料につき	66,440	川崎技術支援部
K4236	断面イオンミリング法　（小さい試料用） D：非常に複雑な試料	1試料につき	88,550	川崎技術支援部
K4237	断面イオンミリング法　（小さい試料用） 条件追加	1条件追加につき	5,610	川崎技術支援部
K4238	断面イオンミリング法　（小さい試料用） クライオ	クライオの使用　1試料につき	5,610	川崎技術支援部
K4240	平面イオンミリング法　（小さい試料用） A：容易な試料	1試料につき	11,330	川崎技術支援部
K4242	平面イオンミリング法　（小さい試料用） B：標準的な試料	1試料につき	22,440	川崎技術支援部
K4244	平面イオンミリング法　（小さい試料用） C：複雑な試料	1試料につき	33,440	川崎技術支援部
K4246	平面イオンミリング法　（小さい試料用） D：非常に複雑な試料	1試料につき	44,550	川崎技術支援部
K4247	平面イオンミリング法　（小さい試料用） 条件追加	1条件追加につき	5,610	川崎技術支援部
K4248	平面イオンミリング法　（小さい試料用） クライオ	クライオの使用　1試料につき	5,610	川崎技術支援部
K4250	断面イオンミリング法　（大きい試料用） A：容易な試料	1試料につき	22,330	川崎技術支援部
K4252	断面イオンミリング法　（大きい試料用） B：標準的な試料	1試料につき	44,330	川崎技術支援部
K4254	断面イオンミリング法　（大きい試料用） C：複雑な試料	1試料につき	66,330	川崎技術支援部
K4256	断面イオンミリング法　（大きい試料用） D：非常に複雑な試料	1試料につき	88,330	川崎技術支援部
K4257	断面イオンミリング法　（大きい試料用） 条件追加	1条件追加につき	5,610	川崎技術支援部
K4258	断面イオンミリング法　（大きい試料用） クライオ	クライオの使用　1試料につき	5,610	川崎技術支援部
K4260	平面イオンミリング法　（大きい試料用） A：容易な試料	1試料につき	11,220	川崎技術支援部
K4262	平面イオンミリング法　（大きい試料用） B：標準的な試料	1試料につき	22,330	川崎技術支援部
K4264	平面イオンミリング法　（大きい試料用） C：複雑な試料	1試料につき	33,330	川崎技術支援部
K4266	平面イオンミリング法　（大きい試料用） D：非常に複雑な試料	1試料につき	44,440	川崎技術支援部
K4267	平面イオンミリング法　（大きい試料用） 条件追加	1条件追加につき	5,610	川崎技術支援部

（試料前処理　（前項までの試験の各項目に適用））

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K4270	イオンビームスパッタ	1試料につき	5,610	川崎技術支援部
K4280	ウルトラミクロトーム法　A:容易な試料	1試料につき	22,220	川崎技術支援部
K4282	ウルトラミクロトーム法　B:標準的な試料	1試料につき	44,770	川崎技術支援部
K4284	ウルトラミクロトーム法　C:複雑な試料	1試料につき	67,320	川崎技術支援部
K4286	ウルトラミクロトーム法　D:非常に複雑な試料	1試料につき	89,760	川崎技術支援部
K4287	ウルトラミクロトーム法　条件追加	1条件追加につき	5,720	川崎技術支援部
K4288	ウルトラミクロトーム法　クライオ	クライオの使用　1試料につき	55,990	川崎技術支援部
K4310	カーボンコーティング	1試料につき	3,300	川崎技術支援部
K4320	金コーティング	1試料につき	3,300	川崎技術支援部
K4330	白金コーティング	1試料につき	3,300	川崎技術支援部
K4340	パラジウムコーティング	1試料につき	3,300	川崎技術支援部
K4350	オスミウムコーティング	1試料につき	3,300	川崎技術支援部
K4170	分散法　ふりかけ法	1試料につき	6,050	川崎技術支援部
K4171	分散法　懸濁法	1試料につき	11,990	川崎技術支援部
K4175	電解研磨法	1試料につき	27,390	川崎技術支援部
K4176	イオンミリング法　　易	1試料につき	100,760	川崎技術支援部
K4177	イオンミリング法　　中	1試料につき	201,520	川崎技術支援部
K4178	イオンミリング法　　難	1試料につき	297,000	川崎技術支援部
K4180	低エネルギーイオンミリング（ジェントルミル）	1試料1条件につき	13,530	川崎技術支援部
K4185	樹脂包埋	1試料につき	13,420	川崎技術支援部
K4192	電子染色	1試料につき	27,830	川崎技術支援部
K4195	その他特殊処理	1試料につき	17,050	川崎技術支援部
K4196	その他特殊処理　条件追加	1条件追加につき	17,050	川崎技術支援部

（5） 成績書の複本の交付

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K9030	成績書の複本・データ等の交付	1通につき（写真を含む場合は別に加算することができる）	300	川崎技術支援部 E5350

（6） 技術開発受託報告書の作成

単位:円

No.	項　　目	単　　位	料金	担当部名
K9050	技術開発受託報告書の作成（データ処理）	基本単位　（難易度により加算あり）	2,970	川崎技術支援部
K9060	技術開発受託報告書の作成（考察）	基本単位　（難易度により加算あり）	6,050	川崎技術支援部
K9070	技術開発受託報告書の複本	1通につき（写真を含む場合は別に加算することができる）	300	川崎技術支援部

2　機器使用料金

（1）生産・加工機器

① 微細加工機器

単位：円

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2425	低エネルギーイオン研磨装置 Model IV5（ジェントルミル）（1時間あたり）	リンダ社 Model IV5 （ジェントルミル）	11,000	川崎技術支援部

（2）環境試験・電磁環境試験機器

① 温湿度環境試験

単位：円

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
K6430	恒温槽（室温～300℃） PVH-110M （1時間あたり）	エスペック PVH-110M	440	川崎技術支援部
K6420	恒温恒湿槽（小）（-40～150℃） ETAC TH411HA （1時間あたり）	楠本化成 ETAC TH411HA	660	川崎技術支援部
K6410	恒温恒湿槽（中）（-40～150℃） ETAC FX424P （1時間あたり）	楠本化成 ETAC FX424P	880	川崎技術支援部
K6460	恒温恒湿槽（-40～100℃） PL-3FPW （1時間あたり）	エスペック PL-3FPW	880	川崎技術支援部
K6440	プレッシャークッカー ETAC PM420 （1時間あたり）	楠本化成 ETAC PM420	880	川崎技術支援部
K6450	冷熱衝撃試験機 （小） ETAC TS100 （1時間あたり）	楠本化成 ETAC TS100	1,210	川崎技術支援部
K2815	冷熱衝撃試験機 （小） ETAC NT1050W （1時間あたり）	楠本化成 ETAC NT1050W	1,210	川崎技術支援部
K2820	超低温恒温恒湿槽（-70～150℃） PSL-2KPH （1時間あたり）	エスペック PSL-2KPH	880	川崎技術支援部

② 電磁環境試験機器

単位：円

No.	設 備 機 器 名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2310	電波暗室（測定帯域 30MHz～1GHz） TDK製（3m法） （1時間以内）	TDK製（3m法）	8,140	川崎技術支援部
K2311	電波暗室（測定帯域 30MHz～1GHz） TDK製（3m法） （追加30分あたり）	TDK製（3m法）	3,630	川崎技術支援部
K2315	電波暗室（測定帯域 1GHz～18GHz） TDK製（3m法） （1時間以内）	TDK製（3m法）	9,240	川崎技術支援部
K2316	電波暗室（測定帯域 1GHz～18GHz） TDK製（3m法） （追加30分あたり）	TDK製（3m法）	4,180	川崎技術支援部
K2430	シールドルーム SH-H1313 （1時間以内）	ノイズ研究所製 SH-H1313	3,080	川崎技術支援部
K2431	シールドルーム SH-H1313 （追加30分あたり）	ノイズ研究所製 SH-H1313	1,100	川崎技術支援部
K2440	シールドテント TM-2.5-1.7-2-2 （1時間以内）	富山電気ビルディング製 TM-2.5-1.7-2-2	2,860	川崎技術支援部
K2441	シールドテント TM-2.5-1.7-2-2 （追加30分あたり）	富山電気ビルディング製 TM-2.5-1.7-2-2	1,320	川崎技術支援部
K2450	EMI測定システムA（放射雑音測定） N9010A EXA （1時間以内）	キーサイト N9010A	5,280	川崎技術支援部
K2451	EMI測定システムA（放射雑音測定） N9010A EXA （追加30分あたり）	キーサイト N9010A	1,540	川崎技術支援部
K2460	EMI測定システムA（伝導性雑音測定） N9010A EXA （1時間以内）	キーサイト N9010A	4,180	川崎技術支援部
K2461	EMI測定システムA（伝導性雑音測定） N9010A EXA （追加30分あたり）	キーサイト N9010A	1,100	川崎技術支援部

（電磁環境試験機器）

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2350	インピーダンス安定化回路網(ISN) ISN T8、ISN T8CAT6 （1時間以内）	TESEQ社 ISN T8,T8CAT6	1,320	川崎技術支援部
K2351	インピーダンス安定化回路網(ISN) ISN T8、ISN T8CAT6（追加30分あたり）	TESEQ社 ISN T8,T8CAT6	220	川崎技術支援部
K2330	電源高調波電流測定器 PM3000ACE他 （1時間以内）	Voltec PM3000ACE他	2,860	川崎技術支援部
K2331	電源高調波電流測定器 PM3000ACE他 （追加30分あたり）	Voltec PM3000ACE他	880	川崎技術支援部
K2380	パルスイミュニティ試験器 Compact NX5 （1時間以内）	EM Test NX5	2,970	川崎技術支援部
K2381	パルスイミュニティ試験器 Compact NX5 （追加30分あたり）	EM Test NX5	1,210	川崎技術支援部
K2360	静電気試験器 ESS-S3011＆GT-30R （1時間以内）	ノイズ研究所 ESS-S3011&GT-30R	2,860	川崎技術支援部
K2361	静電気試験器 ESS-S3011＆GT-30R （追加30分あたり）	ノイズ研究所 ESS-S3011&GT-30R	1,320	川崎技術支援部
K2776	伝導イミュニティ試験器 NSG2070 （1時間以内）	SCHAFFNER NSG2070	3,080	川崎技術支援部
K2777	伝導イミュニティ試験器 NSG2070 （追加30分あたり）	SCHAFFNER NSG2070	1,540	川崎技術支援部
K2370	ノイズシミュレータ INS-4040 （1時間以内）	ノイズ研究所 INS-4040	3,080	川崎技術支援部
K2371	ノイズシミュレータ INS-4040 （追加30分あたり）	ノイズ研究所 INS-4040	1,540	川崎技術支援部
K2778	電磁波妨害源探査装置 EPS-M1 （1時間以内）	ノイズ研究所 EPS-M1	2,640	川崎技術支援部
K2779	電磁波妨害源探査装置 EPS-M1 （追加30分あたり）	ノイズ研究所 EPS-M1	1,320	川崎技術支援部

（3） 試験・計測機器

① 形状測定

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K6370	表面粗さ形状測定機 サーフコム 550A （1時間あたり）	東京精密 サーフコム550A	1,320	川崎技術支援部

② 物理特性試験機

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K3560	赤外線サーモグラフィー （1時間あたり）	日本アビオニクス TVS-200EX	4,290	川崎技術支援部
K3542	接触角計 DMs-401 （1時間あたり）	協和界面科学 DMs-401	3,300	川崎技術支援部

③ 電気計測機器

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K6510	オシロスコープ WaveRunner62Xi （1時間あたり）	レクロイ WaveRunner62Xi	2,420	川崎技術支援部
K6515	ACミリオームハイテスター 3560 （1時間あたり）	日置電機 3560	660	川崎技術支援部
K6517	超絶縁計 SM-8220 （1時間あたり）	日置電機 SM-8220	220	川崎技術支援部
K6518	交流耐電圧試験器 3158 （1時間あたり）	日置電機 3158	220	川崎技術支援部
K6520	漏れ電流試験器 （1時間あたり）	日置電機 ST5540	1,100	川崎技術支援部

（4） 分析・評価機器（観察）

① マイクロスコープ

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2915	デジタルマイクロスコープ VHX-600 （30分あたり）	キーエンス VHX-600	1,540	川崎技術支援部

② 光学顕微鏡

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K6110	金属顕微鏡　BX-51 （1時間あたり）	オリンパス光学工業 BX-51	1,540	川崎技術支援部

③ 電子顕微鏡

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2015	FE-SEM/EDS　S-4800 （1時間あたり）	日立ハイテクノロジーズ S-4800	38,610	川崎技術支援部
K2411	FE-TEM/EDS　EM-002BF （1時間あたり）	トプコン EM-002BF	56,100	川崎技術支援部
K2642	集束イオンビーム装置 XVision200TB （1時間あたり）	SII社 XVision200TB	53,350	川崎技術支援部
K2660	TEM用グリッド （1個あたり）		3,740	川崎技術支援部
K2681	マルチ解析用集束イオンビーム装置 Scios （1時間あたり）	FEI社 Scios	51,700	川崎技術支援部
K2690	TEM用グリッド（1個あたり） Scios使用		3,740	川崎技術支援部
K2610	マニピュレーター　SISA-30TI-2 （30分あたり）	ナリシゲ SISA-30TI-2	2,860	川崎技術支援部
K2635	レーザーマーカ　LR2100ST（30分あたり）	HOYA LR2100ST	2,860	川崎技術支援部

④ 内部観察機器

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2720	マイクロフォーカスX線検査装置 MXT-160UU （30分以内）	メディエックステック MXT-160UU	3,740	川崎技術支援部
K2725	マイクロフォーカスX線検査装置 MXT-160UU （追加15分あたり）	メディエックステック MXT-160UU	1,540	川崎技術支援部

（5） 分析・評価機器（組成分析）

① 元素分析

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K2210	微小部蛍光X線分析装置（XRF） SEA6000VX HSFinder （1時間あたり）	SII社　SEA6000VX HSFinder	5,500	川崎技術支援部

② 組成分析

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K6050	フーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR） FT/IR-6300FV・IRT-7000（1時間あたり）	日本分光 FT/IR-6300FV・IRT-7000	8,800	川崎技術支援部

（6） 分析・評価機器（ 物性〔光、熱、音振、エネルギー〕）

① 光学機器・分光分析

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K3550	紫外・可視分光光度計 UH4150（1時間以内）	日立ハイテクサイエンス　UH4150	7,920	川崎技術支援部
K3552	紫外・可視分光光度計 UH4150（追加30分あたり）	日立ハイテクサイエンス　UH4150	2,640	川崎技術支援部

（7） 機器操作指導料

単位：円

No.	設　備　機　器　名	メーカー・型式	料金	担当部名
K7030	機器操作指導料 （開放利用時に適用） 15分あたり	立会人１人、15分あたり	2,860	川崎技術支援部